明細書

弹性表面波装置

技術分野

[0001] 本発明は、弾性表面波装置に関し、詳しくは弾性表面波素子を備えた弾性表面波装置に関する。

背景技術

- [0002] 従来、1段目の不平衡 平衡型フィルタと2段目の平衡 平衡型フィルタとをカスケート接続したバランス型SAW(弾性表面波)フィルタにおいて、段間にフィルタの平衡端子同士を接続する信号配線が配置され、その信号配線の間に、1段目の不平衡端子のIDT (Inter Digital Tran duoor;櫛型電極)の他方の端子に接続されたアースパッドが配置される構成が提案されている。
- [0003] 図5は従来例の弾性表面波装置が備える基板の平面図である。基板121 Oは、LiTaO、の単結品基板であり、その主面1212には、図5に示すように、所定パターンの金属膜が形成されている。すなわち、1段目の縦結合共振子型弾性表面波フィルタ1222段目の縦結合共振子型弾性表面波フィルタ123 Oをカスケート接続し、パット1251を不平衡端子、パット1252、1253を平衡端子として使用するバランス型SAWフィルタを構成している。フィルタ122 Q 123 Oとフィルタ122 Q 123 Oをカスケート接続する配線1241、1242とによって囲まれる領域に、不平衡端子1251を含むIDT1223 に接続されるアースパット1256が配置されている(例えば、特許文献1参照)。
- [0004] また、近年、携帯電話機のRF段に使用される弾性表面波フィルタに、平衡 不平衡変換機能、いわゆるバランの機能を持たせる要求が強くなってきている。特に最近では、高周波に対応でき、かつ平衡 不平衡変換機能に容易に対応できる縦結合共振子型弾性表面波フィルタが、携帯電話機のRF段のバンドパスフィルタとして主流になってきている。
- [0005] この平衡 不平衡変換機能を持たせた弾性表面波フィルタは、平衡、あるいは差動入出力をもつミキサーIC(以下、平衡型ミキサーIC」れづ。)に接続される。この平衡型ミキサーICを用いた場合、ノイズの影響低減及び出力の安定でを図ることが

できるため、携帯電話機の特性向上のため、近年多く使われている。

- [0006] このような平衡 不平衡変換機能を持たせた弾性表面波フィルタは様々な構成が考えられ、数多<提案されている。これらは構造毎にメリット、デメリットがあり、用途やユーザー要求に合わせて使い分けている。その中の1つに、1つのIDTの両端に平衡信号端子を接続する構成がある。
- [0007] 例えば図6に、この種の弾性表面波フィルタの素子チップ3 0の構成例を模式的に示す。この弾性表面波フィルタは、3つのIDT1、2、3と2つリフレクタ4、5とを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子6の、中央に位置するIDT1の両端を平衡信号端子皿、12にそれぞれ接続し、左右に位置するIDT2、3の一端を、IDT7の両側にリフレクタ8、9が配置された弾性表面波共振子1 0のIDT7を介して不平衡信号端子13に接続することで平衡-不平衡変換機能を持たせている。この弾性表面波フィルタは、IDT2、3の他端は、アース端子に接続されている。
- [0008] この素子チップ30は、底部が上部層と下部層に2分割されるパッケージに収納される。図7は、素子チップ30を実装するパッケージ底部31の上部層33の上面、図8はパッケージ底部31の下部層36の下面(パッケージ裏面)を示している。
- [009] 図7に示すよっに、パッケージ底部31の上部層33のダイアグッチ部41には、配線パターン(ランド)42~45が露出し、図6及び図7において白丸で示すパンプ39により、素子チップ3 0の端子(パッドとパンプ接続される。図7において黒丸で示すビアホール46,47は、パッケージ底部31の上部層33を貫通し、配線パターン45,44と、図8に示した下部層36の配線パターン61,63とを接続する。図9に示した外部端子52~56のっち、図において右辺中央の外部端子56が不平衡信号端子、左辺上下の外部端子52,53が平衡信号端子、その他の外部端子54,55がアース端子となる。不平衡信号端子である外部端子56は、キャスタレーション48を介して、不平衡信号用の配線パターン42に接続される。平衡信号端子である外部端子52,53は、キャスタレーション49,50を介して、平衡信号用の各配線パターン43,44に接続される。
- [0010] つまり、図6に示す素子チップ30上の第1及び第2の平衡信号端子(パッド)11,12

の配置に対応して、図7に示すよっに、素子チップ30のフリップチップ実装用パッケージには、第1の平衡信号端子用配線パターン(ランド)43をパッケージの一辺の中央に形成し、第2の平衡信号端子用配線パターン(ランド)44を第1の平衡信号端子用配線パターン(ランド)43に近接したコーナー部に形成している。素子チップ30において、IDT1の一端と第1の平衡信号端子皿を接続する信号ライン1aと、平衡IDT1の他端と第2の平衡信号端子12とを接続する信号ライン1bとが非対称になり、このままでは平衡度が劣でする。そこで、図9に示すよっに、第1、第2の平衡信号端子となる外部端子52、53をパッケージの中心軸に対して互いに対称に配置し、第1の平衡信号端子である外部端子52へ接続する信号ラインと第2の平衡信号端子である外部端子53へ接続する信号ラインと第2の平衡信号端子である外部端子53へ接続する信号ラインとのパッケージ内における経路差により、平衡度を調整している(例えば、特許文献2)。

- [0011] 図6 ~図9の弾性表面波フィルタのパッケージは、図22に示すように、3つのIDT 66a, 66b, 66c; 68a, 68b, 68cと2つのリフレクタ66s, 66t; 68s, 68tとをそれぞれ有する2つの縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子66, 68をカスケート接続した構成の素子チップ6 0の実装にも用いることができる。すなわち、図1に示した素子チップ3 0と、図22に示した素子チップ6 0とは、外形寸法が同じであり、かつ、端子(パッド)の配置も同じである。
- [0012] 特許文献3には、縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子の中央のIDTの弾性表面波伝搬方向に対して直角方向の両側に出した2つの端子を平衡信号端子に接続し、両側のIDTを2本の不平衡信号ラインを用いて不平衡信号端子に接続し、一方の平衡信号ラインと一方の不平衡信号ラインとが絶縁膜を介して立体交差されて、平衡度を改善したフロートバランス型弾性表面波フィルタが開示されている。

特許文献 1: 特開2 002-3 00004号公報

特許文献2:特開2002-271168号公報

特許文献3:特開2003-204243号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0013] 図5の従来例のように2素子をカスケート接続し、段間にアースパットを配置する場

合、カスケート接続配線とアースパッドとの間の浮遊容量が大きいために通過帯域内 挿入損失が大きくなるれづ問題がある。

- [0014] 本発明は、かかる実情に鑑み、域内挿入損失を低減することができる、2素子をカスケート接続した弾性表面波装置を提供することを、第1の目的とする。
- また、特許文献2に開示されたような方法で、1つのIDTの両側の端子に平衡信号 [0015]端子を接続して平衡一不平衡変換機能を持たせた構成の弾性表面波フィルタは、 パッケージの構造が複雑かつ特殊であるので、パッケージがこの素子構成専用とな ってしまっ。そのため、例えば図10に構成を示す弾性表面波フィルタ70よっに、3つ のIDT71a, 71b, 71c; 72a, 72b, 72cと2つのリフレクタ71s, 71t; 72s, 72tとをそ れぞれ有する2つの縦結合共振子型フィルタ素子71,72がカスケート接続され、一 方の縦結合共振子型フィルタ素子71の中央のIDT71aの一端が不平衡端子73に 接続され、他方の縦結合共振子型フィルタ素子72の中央のIDT72aの一端(一方の バスバー)が2分割され、それぞれ平衡信号端子74, 75に接続されるものや、図皿 に構成を示す弾性フがレタ8 0のように、3 つのIDT81a, 81b, 81c; 82a, 82b, 82c ;83a, 83b, 83c;84a, 84b, 84cと2つのリフレクタ81s, 81t;82s, 82t;83s, 83t ;84s,84tとをそれぞれ有しカスケート接続された2組の弾性表面波フィルタ素子81 , 82, 83, 84 について、各組の一方の弾性表面波フィルタ素子81, 83の中央のID T8111,8311の一端を平衡端子85,86にそれぞれ接続し、各組の他方の弾性表面 波フィルタ素子82, 84の中央のIDT8211,8411の一端を不平衡端子87に接続したも のなど、弾性表面波素子を結合する態様が異なる他の構成の平衡-不平衡変換機 能を有する弾性表面波フィルタとパッケージが共用べできない。
- [0016] さらに、パッケージ内での信号ラインが非対称となるので、寄生容量等の影響が平 衡信号端子で異なってしまい、平衡信号端子間の平衡度が悪いれづ問題がある。
- [0017] 特許文献3の弾性表面波フィルタは、平衡信号ラインを圧電基板上に形成し、不平衡信号ラインを平衡信号ラインの上に形成された絶縁膜上に形成して立体交差している。そのため、2つの平衡信号端子それぞれに入る寄生容量、橋絡容量の差が大きくなり、十分な平衡度改善効果が得られない。
- [0018] 本発明は、かかる実情に鑑み、他の構成の弾性表面波フィルタとパッケージの共用

化が容易であり、かつ平衡信号端子間の平衡度を改善した、弾性表面波フィルタを 提供することを、第2の目的とする。

[0019] すなわち、本発明は、特性を向上することができる弾性表面波装置を提供しよっと するものである。

課題を解決するための手段

- [000] 本発明は、以下のように構成した弾性表面波装置を提供する。
- [0021] 弾性表面波装置は、基板と、前記基板に配置され、少なくとも不平衡端子及び2つの平衡端子を含む、複数の端子と、前記基板の前記不平衡端子と2つの前記平衡端子との間に配置された、少なくとも1つの弾性表面波素子とを備える。同一の前記弾性表面波素子にそれぞれ接続された異なる信号線が、絶縁膜を介して交差する。
- [0022] 上記構成において、基板は、基板全体が圧電材料からなる圧電基板であっても、 非圧電材料からなる基板本体に圧電材料の薄膜(圧電薄膜)を形成した圧電基板で あってもよい。後者の場合、少なくとも弾性表面波素子の部分には圧電薄膜を形成 する。平衡端子には平衡信号を、不平衡端子には不平衡信号を、それぞれ入力又 は出力する。
- [0023] 上記構成のように弾性表面波素子にそれぞれ接続された異なる信号線が絶縁膜を介して交差すれば、信号線が交差しないように信号線を引き回す場合よりも、信号線を短くすることができ、また、信号線の引き回しの制約が緩和される。
- [0024] これょって、例えば、2つの弾性表面波素子を信号線で接続してバランス型弾性表面波フィルタを構成する場合、弾性表面波素子間にパッドを設けないで、2つの弾性表面波素子の間隔を小さくして、弾性表面波素子間を接続する信号線を短くすることによって、挿入損失を低減することができる。
- [0025] また、弾性表面波素子間を接続する信号線や、弾性表面波素子と端子との間を接続する信号線について、引き回しの制約が緩和されるので、パッケージの共用 化が容易となる。
- [0026] 好ましくは、前記絶縁膜がポリイミドである。
- [0027] ポリイミドの比誘電率は圧電基板の比誘電率に比べて十分小さいので、浮遊容量を小さくすることができる。

6

- [0028] 好ましい第1の態様としては、少なくとも2つの前記弾性表面波素子を備える。1つの前記弾性表面波素子(以下、第1の素子」れづ。)は、前記不平衡端子と、接地するための接地端子(以下、アースパッドれづ。)とに、それぞれ異なる前記信号線によって接続される。他の1つの前記弾性表面波素子(以下、第2の素子」れづ。)と前記第1の素子との間をそれぞれ接続する少なくとも2つの前記信号線(以下、「信号配線」れづ。)が形成される。少なくとも1つの前記信号配線と、前記アースパッドと前記第1の素子との間を接続する前記信号線(以下、アース配線」れづ。)とが、前記絶縁膜を介して交差する。前記アースパッドが、前記第1の素子、前記第2の素子、及び前記信号配線とによって囲まれる領域の外側に配置されている。
- [0029] 従来装置ではアースパッドが第1の素子と第2の素子と信号配線とによって囲まれる領域の内側に形成され、通過帯域内挿入損失が大きくなっていたが、上記構成によれば、アースパッドを第1の素子と第2の素子と信号配線とによって囲まれる領域の外側に形成することにより、アースパッドと信号配線との間の浮遊容量を小さくして通過帯域内挿入損失を低減することができる。
- [0030] 好ましくは、前記第1の素子は、弾性表面波の伝搬方向を揃えて配置された3つの1DTを含み、その中央の前記IDTに前記不平衡端子と前記アースパッドとが接続される。前記第2の素子は、弾性表面波の伝搬方向を揃えて配置された3つのIDTを含み、その中央の前記IDTに2つの前記平衡端子が接続される。前記第1の素子の両側の前記IDTと前記第2の素子の両側の前記IDTとが前記信号配線によってそれぞれ接続されている。
- [0031] 上記構成によれば、縦結合共振子型SAWフィルタ素子(第1の素子、第2の素子)を2段カスケート接続したバランス型SAWフィルタの通過帯域内挿入損失を低減することができる。
- [0032] 好ましくは、2組の前記第1の素子、前記信号配線及び前記第2の素子が前記基板に形成される。各組の前記第1の素子は、それぞれ、弾性表面波の伝搬方向を揃えて配置された3つのIDTを含み、その中央の前記IDTに前記不平衡端子と前記アースパッドとが接続される。各組の前記第2の素子は、それぞれ、異なる1つの前記平衡端子に接続された1つのIDTを含む。各組の2つの前記信号配線は、各組の前記

第1の素子の両側の前記IDTと各組の前記第2の素子の前記IDTとをそれぞれ接続する。2組の前記第1の素子は逆位相である。

- [0033] 上記構成によれば、平衡パッドに接続された縦結合共振子型SAWフィルタ(第1の素子)と1ポートSAW共振子(第2の素子)を直列に接続し、これを2組並列に接続し、縦結合共振子型SAWフィルタ(第1の素子)が逆位相となるよっにし、1ポートSAW共振子(第2の素子)をトラップとして用い、フィルタ特性を改善したパランス型SAWフィルタにおいて、通過帯域内挿入損失を低減することができる。
- [0034] 好ましくは、前記アース配線は、前記絶縁膜及びその近傍の部分を除いて形成された1層目と、前記絶縁膜及びその近傍の部分を含めて形成された2層目とを有する。
- [0035] 上記構成によれば、アース配線には、絶縁膜の前後において2層が重なるので、アースの残留インピーダンスが小さくなり、帯域外減衰が改善される。また、信号配線は、1層のみで形成することができ、絶縁膜の前後において2層が重なるようにする必要がないので短くすることができ、第1の素子と第2の素子との間の距離を短くして小型でを図ることができる。
- [0036] 好ましい第2の態様としては、互いに接続された少なくとも2つの前記弾性表面波素子」れづ。)は、子を備える。1つの前記弾性表面波素子(以下、第1の弾性表面波素子」れづ。)は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置された3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子であり、3つの前記IDTのうち中央の前記IDTが2つの前記信号線(以下、第1及び第2の信号ライン」れづ。)を介して2つの前記平衡信号端子にそれぞれ接続される。2つの前記平衡信号端子は、2つの前記弾性表面波素子が並ぶ方向と略平行な前記基板の中心軸の両側にそれぞれ配置される。前記第1及び第2の信号ラインの少なくとも一方が、前記基板上に形成された前記絶縁膜上に配置される。
- [0037] 上記構成において、第 本及び第2の信号ラインの少なくとも一方が弾性表面波素子間を接続する信号線と交差する場合、この交差部分において、絶縁膜を介して立体交差するようにする。
- [0038] 上記構成によれば、弾性表面波素子を結合する態様が異なる他の構成の弾性表

面波フィルタと同区位置に平衡信号端子を配置して、パッケージを共用ですることができる。また、平衡信号端子に接続される信号ラインを絶縁膜上に配置することにより、2つの平衡信号端子にそれぞれ入る寄生容量、橋絡容量の差を小心くして、平衡度を改善することができる。

- [0039] 好ましくは、2つの前記平衡信号端子は、前記基板の前記中心軸に対して略対称に配置される。
- [0040] 上記構成によれば、対称に平衡信号端子が配置されている他の構成の弾性表面波フィルタと略同区位置に平衡信号端子が配置されるので、パッケージの共用でに優れる。
- [0041] 好ましくは、前記第2の弾性表面波素子は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置され、前記第1の弾性表面波素子にカスケート接続された3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子である。
- [0042] 上記構成によれば、通過帯域外の減衰量を大きくすることができる。
- [0043] 好ましくは、前記第2の弾性表面波素子は、1つまたは複数接続された弾性表面波 共振子素子である。
- [0044] 上記構成によれば、通過帯域外の減衰量を大きくすることができる。
- [0045] 好ましい第3の態様としては、前記弾性表面波素子は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置された3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子であり、3つの前記IDTのうち中央の前記IDTが前記信号線(以下、第1及び第2の信号ライン」れづ。)を介して2つの前記平衡端子にそれぞれ接続される。2つの前記平衡信号端子は、弾性表面波の伝搬方向に垂直方向の前記基板の中心軸の両側にそれぞれ配置される。前記第1及び第2の信号ラインの少なくとも一方が、前記圧電基板上に形成された絶縁膜上に配置される。
- [0046] 上記構成において、第 * 及び第2の信号ラインの少なくとも一方が、IDTと平衡端子以外の端子との間を接続する信号ラインや接続ラインと交差する場合、この交差部分において、絶縁膜を介して立体交差するようにする。
- [0047] 上記構成によれば、弾性表面波素子を結合する態様が異なる他の構成の弾性表面波フィルタと同区位置に平衡信号端子を配置して、パッケージを共用ですることが

できる。また、平衡信号端子に接続される信号ラインを絶縁膜上に配置することにより、2つの平衡信号端子にそれぞれ入る寄生容量、橋絡容量の差を小心くして、平衡度を改善することができる。

発明の効果

[0048] 本発明の弾性表面波装置は、特性を向上することができる。例えば、上記第1の態様の場合、通過帯域内挿入損失を低減することができる。また、上記第2及び第3の態様の場合、特許文献2に開示された構成よりも各平衡信号端子に入る寄生容量の差が小さくなり、平衡信号端子間の平衡度が改善される。また、図10、図皿等に示した別の構成の平衡一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタと、パッケージの共用ペが可能となり、専用のパッケージを作製する必要がなくなる。

図面の簡単な説明

- [0049] [図1]バランス型SAWフィルタの平面図である。(実施例1)
 - [図2]図1の線II-Iに沿って切断した断面図である。(実施例1)
 - [図3]バランス型SAWフィルタの平面図である。(実施例2)
 - [図4]図3の線IV-IVに沿って切断した断面図である。(実施例2)
 - [図5]バランス型SAWフィルタの平面図である。(従来例)
 - [図6]圧電基板の構成図である。(従来例2)
 - [図7]パッケージの上部層の平面図。(従来例2)
 - [図8]パッケージの下部層の平面図。(従来例2)
 - [図9]パッケージの底面図である。(従来例2)
 - [図10]弾性表面波フィルタの構成図である。(参考例1)
 - [図11]弾性表面波フィルタの構成図である。(参考例2)
 - [図12]弾性表面波フィルタの構成図である。(実施例3)
 - [図13]圧電基板の平面図である。(実施例3)
 - [図14]弾性表面波フィルタの特性を示すグラフである。(実施例3)
 - [図15]圧電基板の平面図である。(比較例)
 - [図16]圧電基板の平面図である。(実施例4)
 - [図17]圧電基板の平面図である。(実施例5)

[図18]圧電基板の平面図である。(参考例1)

[図19]圧電基板の平面図である。(参考例2)

[図20]パッケージの底面図である。(実施例3)

[図21]圧電基板の平面図である。(実施例6)

[図22]圧電基板の平面図である。(従来例2)

[図23]圧電基板の平面図である。(実施例7)

符号の説明

[0050] 100 圧電基板

- 101 弾性表面波フィルタ素子(第2の弾性表面波素子)
- 102 弾性表面波フィルタ素子(第1の弾性表面波素子)
- 103, 104, 105 IDT
- 108, 109, 110 IDT
- 118, 119 平衡信号端子
- 123, 124 信号ライン
- 150 弾性表面波共振子素子(第2の弾性表面波素子)
- 25 Q 251, 252 絶縁膜
- 500 圧電基板
- 502 弾性表面波フィルタ素子(弾性表面波素子)
- 508, 509, 510 IDT
- 518, 519 平衡信号端子
- 523, 524 信号ライン
- 65 Q 652 絶縁膜
- 1010基板
- 1014,1016 絶縁膜
- 1020 フィルタ(第1の素子)
- 1 022, 1 023, 1 024 IDT
- 1030 フィルタ(第2の素子)
- 1 032, 1 033, 1 034 IDT

- 1041,1042 西縣(高場時級)
- 1048 西路(アース西路)
- 1048a ,1048b ,1048c 1 贈目
- 1 048s 2^{月17} 目
- 1051 パッド体 严極帰刊
- 1052,1053 パッド(門徳野場口)
- 1054,1055 アースパッド
- 11 06 ,1 01 07 絶縁膜
- 1110 フィルタ悌1の琴刊
- 1114 ,116 ,118 IDT
- 1120 フィルタ悌1の琴刊
- 1124 ,126 ,128 IDT
- 1130 トラップ 悌2の琴刊
- 1134 IDT
- 1140 トラップ 悌2の琴刊
- 1144 IDT
- 1153 西線 (アース西線)
- 1153a 1^{月曾} 目
- 1153s 2^{月曾}目
- 1154 西線 (アース西線)
- 1154a 1^贈目
- 1154s 2^周目
- 1155 ,1156 ,1157 ,1158 西縣(富小寺西皖泉)
- 1172 アースパッド [核地場刊]
- 1173 パッド体 严樹端刊
- 1174, 1175 パッド(呼線場中)

発明を実施するための最良の形態

- [0051] 以下、本発明の実施の形態として実施例を、図1~図23を参照しながら説明する。
- [0052] まず、本発明の実施例1、2について、図1 ~図4を参照しながら説明する。
- [0053] (実施例1) 実施例1の弾性表面波装置について、図1及び図2を参照しながら説明する。図1は、実施例1の弾性表面波装置が備える基板1 01 0の平面図、図2は図1の線IIーIIに沿って切断した断面図である。
- [0054] 実施例1の弾性表面波装置は、基板1 01 0を備えたEGSM受信帯用フィルタである。例えば、入力側インピーダンスが5 0白、出力側インピーダンスが15 0白、通過周波数帯域が925 ~96 0MHz、中心周波数が942.5MHzである。
- [0065] 基板1 01 0は、LiTaO3の単結品圧電基板であり、その主面1 012には、図1に示すよっに、所定パターンの金属膜が形成されている。すなわち、1段目の縦結合共振子型弾性表面波フィルタ1 02 0(以下、ワィルタ1 02 0)と言っ。)と2段目の縦結合共振子型弾性表面波フィルタ1 03 0(以下、ワィルタ1 03 0)と言っ。)を縦続(カスケー同接続し、パッド31を不平衡端子、パッド1 052,1 063を平衡端子として使用するパランス型SAWフィルタを構成している。第1の素子であるフィルタ1 02 0と第2の素子であるフィルタ1 03 0とを縦続接続する配線(すなわち、信号配線)1 041,1 042は、絶縁関1 014,1 016を介して、不平衡端子1 051を含むIDT1 023に接続されるアース配線1 048と立体交差している。不平衡端子1 051に対するアース配線1 048は、段間以外の場所に設けられたアースパッド1 054,1 055に接続されている。アースパッド1 054,1 055は、接地するための接地端子である。フィルタ1 02 0,1 03 0は、それぞれの弾性表面波の伝搬方向が互いに平行になるよっに、並列に配置されている。
- [0056] 詳しくは、1段目のフィルタ1 02 0は、3つのIDT1 022, 1 023, 1 024が、弾性表面波の伝搬方向に一列に揃えて配置され、その両側に2つの反射器1 021, 1 025が配置されている。中央のIDT1 023の一方の電極側は、配線1 047を介して、不平衡端子であるパッド1 051に接続されている。他方の電極側は、配線1 04 0, 1 048から配線1 043, 1 046を経て、アースパッド1 054, 1 055に接続されている。アースパッド1 064, 1 055には、配線1 044, 1 045を介して、他のIDT1 022, 1 024の一方の電極側も接続されている。
- [0057] 2段目のフィルタ1 03 0は、3 つのIDT1 032, 1 033, 1 034が、弾性表面波の伝搬

方向に一列に揃えて配置され、その両側に2つの反射器1 Ø 1, 1 Ø 5 が配置されている。

- [008] 中央のIDT1033の一方の電極側は、配線1056,1057を介して、平衡端子であるパッド1052,1053に接続され、他方の電極は浮き電極となっている。IDT1033の両側に配置されたIDT1032,1034の一方の電極側は、配線1041,1042を介して、1段目のフィルタ1020のIDT1022,1024の他方の電極側に接続されている。IDT1032,1034の他方の電極側は、配線1043,1046を介して、アースパッド1054,1055に接続されている。
- [0059] フがレタ1 02 0, 1 03 0間を接続する信号線路の配線1 041, 1 042の一部を覆っよっに、矩形の絶縁膜1 014, 1 016が形成され、絶縁膜1 014, 1 016の上に配線1 048 が形成され、配線1 041, 1 042と配線1 048とが、絶縁膜1 014, 1 016を介して、立体交差するようになっている。
- [006 0] 絶縁膜1 014, 1 016の寸法は、図において横方向(配線1 048の延在方向)の寸法が50μm、図において縦方向(配線1 041, 1 042の延在方向)の寸法が1 04 0~50μm、厚さが2μmである。立体交差する下側の配線1 041, 1 042の幅は約3 0μm、上側の配線1 048の幅は2 0~30μmである。フィルタ1 02 Q 1 03 0の間隔は6 0~7 0μmである。アースパッド1 054, 1 055の寸法は、1 00μm×1 00μmである。カスケート接続した2つの縦結合共振子型弾性表面波フィルタの間に同じ寸法のアースパットを設けた従来例では、フィルタ間の距離が2 00μm程度であることから、実施例1では、フィルタ素子間の距離を従来例の約1/3以下に短くしたことになる。絶縁膜1 014, 1 016には、例えば感光性樹脂(ボリイミド、比誘電率:約2)を用いる。
- [0061] 実施例1では、アースパッド1 054, 1 055に接続するための配線1 048(アース配線1 048」とも言う。)と、フィルタ1 02 0, 1 03 0間を接続する配線1 041, 1 042(信号配線1 041, 1 042」とも言う。)とが平面視で交差する面積が十分小さく、かつ絶縁膜1 014, 1 016の比誘電率が、LiTaO3の基板1 0の比誘電率約5 0に比べて十分小さく、かつ絶縁膜1 014, 1 016の厚さが十分大きいので、従来例のように、2素子をカスケード接続し、段間にアースパッドを配置する構成と比較して、浮遊容量を低減することができる。

- [0062] 次に、基板1010の製造方法を説明する。
- [0063] まず、基板1 01 0の主面1 012に、トライエッチング又はリフトオフを用いて、1層日のAI膜パターンを形成する。1層日のAI膜パターンは、IDT、パッド、配線などの最終的な金属膜パターンと略一致する。ただし、図2に示すよっに、配線1 048の1層目1 048a, 1 048b, 1 048cの間に絶縁膜1 014, 1 016を配置できるよっに、配線1 048については、絶縁膜1 014, 1 016を形成する部分及びその近傍部分に1層日のパターンを形成しない。1層日のAI膜厚はIDT1 022~1 024, 1 032~1 034の膜厚と同じになり、例えば8 00MHz帯SAWフィルタでは3 00~4 00mm, 2GHz帯SAWフィルタでは15 0mm~2 00mmである。
- [0064] 次に、感光性樹脂を塗布して、フォトリングラフィー技術を用いて、フィルタ1 02 0,1 03 0間の配線1 041,1 042とアース配線1 048の交差部分に、絶縁膜1 014,1 016 を形成する。
- [0065] 次に、フィルタ1 02 0, 1 03 0及び配線1 041, 1 042の露出部分を除き、最終的な金属膜パターンに対応して開口したレジストマスクを形成し、リフトオフを用いて2層日のA1膜パターンを形成する。1層日のA1と基板1 01 0との間、または2層日のA1と1層日のA1との間に、接着層としてTi、又はNiCrを形成してもよい。
- [0066] これにより、図2に示すよっに、配線1 048の2層 目1 048s を1層 目1 048a, 1 048b, 1 048c に重ね合わせて接続する。2層 目1 048s と1層 目1 048a, 1 048b, 1 048c の接続部において、2層 目1 048s と1層 目1 048a, 1 048b, 1 048c との間の接続抵抗を十分に小さくするために、接続部の面積を一定以上の大きさにする必要がある。そのため、配線1 048は、1層 目1 048a, 1 048b, 1 048c と2層 目1 048s との重ね合わせ面積が2 0μ m角以上の面積となるよっにする。
- [0067] ところで、立体交差の上側の配線(2層目)は、いずれかの場所で、IDTにつながる 1層目に接続する必要がある。2素子間を接続する信号線路を立体交差の上側に配置する場合、一方の素子と立体交差部との間、及び他方の素子と立体交差部との間に、それぞれ、1層目と2層目を接続する部分が必要になる。すなわち、2素子間の 距離は、立体交差の絶縁膜のみならず、その前後の1層目と2層日の接続部を含めるように、大きくする必要がある。

- [0068] これに対し、実施例1のように2素子(フィルタ1 02 0, 1 03 0) 間を接続する信号線路 (配線1 041, 1 042) を立体交差の下側に配置する場合、素子と立体交差部との間 に接続部を設ける必要がないので、2素子間の距離は、立体交差の絶縁膜の寸法だけで決定できる。そのため、2素子間の距離を短くすることができる。
- [0069] 特に実施例1では、2段目中央のIDT1 033を分割し平衡出力(または平衡入力)に対応する構成を取り、2段目中央のIDT1 033にはアース配線が不要であるため、フィルタ1 02 0, 1 03 0間のアース配線は、1段目中央のIDT1 023のアース配線1 048のみでよい。
- [0070] 実施例1では、フィルタ1 02 Q 1 03 0間の信号配線1 041, 1 042が1層 日のみとなって線路の電気抵抗率が増大するが、フィルタ1 02 Q 1 03 0間の距離を短くし、帯域内挿入損失の劣化を防ぐことができる。
- [0071] 実施例1の弾性表面波装置は、アースパッド1 054, 1 055をフィルタ1 02 0, 1 03 0間(段間)から移動したことによる信号線ーアースパッド間の浮遊容量の低減、段間距離を小さくした(つまり、フィルタ1 02 0, 1 03 0間の信号配線1 041, 1 042を短くした(ことにより、通過帯域内挿入損失を低減できる。
- [0072] (実施例2)次に、本発明の実施例2の弾性表面波装置について、図3及び図4を参照しながら説明する。図3は、実施例2の弾性表面波装置が備える基板1100の平面図、図4は図3の線[V-IVに沿って切断した断面図である。
- [0073] 実施例2の弾性表面波装置は、主面11 02に所定パターンの金属膜が形成された 基板11 00を不図示のパッケージに収納したデバイスであり、実施例1と同様の方法 で製造することができる。以下では、実施例1との相違点を中心に説明する。
- [0074] 実施例2の弾性表面波装置は、DCS受信帯用の弾性表面波フィルタである。例えば、入力側インピーダンスが50°、出力側インピーダンスが150°、通過周波数帯域が1805~1880MHである。
- [0075] 図3に示すように、2組の第1の素子である縦結合共振子型SAWフィルタ1110,1 120(以下、ウィルタ1110,11120)を言う。)を、不平衡端子であるパッド173に 並列接続し、パッド174,1175を平衡端子として用いる。フィルタ1110,1120には、それぞれ直列に、第2の素子である1ポートSAW共振子1130,1140(以下、トラ

ップ1130 1140と言う。)が接続されている。

- [0076] 実施例1のよっな縦結合共振子型SAWフィルタの2素子カスケード接続は、通過帯域外を高減衰量べできるといづ利点があるあるが、通過帯域内挿入損失が大きくなる欠点がある。実施例2のよっに縦結合共振子型SAWフィルタ111 Q 112 0に1ポートSAW共振子113 Q 114 0を直列接続することにより、通過帯域のごく近傍を高減衰にすることができる。1ポートSAW共振子113 Q 114 0は、反共振周波数を縦結合共振子型SAWフィルタ111 Q 112 0の通過帯域よりも高周波数側に位置させた、いわゆるトラップとして用いている。
- [0077] 詳しくは、フがレタ111 Q 112 Oは、それぞれ、3つのIDT1114, 1116, 1118;11 24, 1126, 1128が、弾性表面波の伝搬方向に一列に揃えて配置され、その両側に2つの反射器1112;1122が配置されている。中央のIDT1116;1126の一方の電極側は、配線1151;1152を介して、不平衡端子であるパッド1173に接続されている。他方の電極側は、配線1153a, 1153;1154a, 1154を介して、接地端子であるアースパッド1172に接続されている。アースパッド1172には、配線115 Q 1159を介して、他のIDT1114, 1118;1124, 1128の一方の電極側も接続されている。
- [0078] フがレタ111 Q 112 Oとは、逆位相となっている。また、一方のフがレタ112 OのIDT 1124, 1128は、平衡度の調整のため、交差幅に重み付けをしている。
- [0079] トラップ113 Q, 114 Oは、IDT1134, 1144の両側に反射器1132, 1142が配置されている。IDT1134;1144の一方の電極側は、それぞれ、配線1155, 1156;1157,1158を介して、フがレタ111 Q, 112 OのIDT1114, 1118;1124, 1128の他方の電極側に接続されている。IDT1134;1144の他方の電極側は、配線116 Q, 1162を介して、平衡端子であるパッド174, 1175に接続されている。
- [0080] フがレタ111 Q 112 0とトラップ113 Q 114 0とをそれぞれ縦続接続する配線1155 , 1156;1157, 1158のっち一方1156, 1157は、中央に配置されたアースパッド1 172とフがレタ111 Q 112 0とを接続する配線1153, 1154と、絶縁膜11 06, 11 07 を介して立体交差している。また、配線1151, 1152と配線115 0も、絶縁膜11 04, 11 05を介して立体交差している。
- [0081] 絶縁膜1104,1105,1106,1107の寸法は、図3において横方向(配線1150,1

153, 1154の延在方向)の寸法が $70\,\mu$ m、図3において縦方向(配線1151, 1152の延在方向、配線1153, 1154の延在方向と直角方向)の寸法が $40\sim50\mu$ m、厚さが 2μ mである。立体交差する下側の配線1150, 1156, 1157の幅は約 30μ m、上側の配線1151, 1152, 1153, 1154の幅は $20\sim30\mu$ mである。フィルタ11100 1120とトラップ1130140との間隔は $60\sim70\mu$ mである。アースパッド172の寸法は、 100μ m× 100μ mである。フィルタとトラップの間に同じ寸法のアースパッドを設けた従来例では、フィルタとトラップの間の距離が 200μ m程度であり、実施例2では、フィルタ11101120とトラップ11301140の間の距離を、従来例の約1/3以下に短<することができる。

- [0082] 図4に示すよっに、絶縁膜11 06, 11 07上には、配線1153, 1154の2層 目1153s , 1154sが形成され、絶縁膜11 06, 11 07の両側で、アースパッド1172の1層 目皿 72aと1層 日のみの配線1153a, 1154aとに重ね合わせるよっになっている。1層 目と 2層目は、2 0μ m角以上の面積での重ね合わせ、接続する。
- [0083] なお、2層目は、パッド1172, 1173, 1174, 1175、配線1150の中間部分及び配線1151, 1152, 1153, 1154, 1159, 116Q 1162に形成される。
- [0084] 実施例2は、フがレタ111 Q 112 0とトラップ113 Q 114 0の間で立体配線となっているが、実施例1と同様な効果を有する。すなわち、フがレタ111 Q 112 0とトラップ1 13 Q 114 0の2素子間の距離は、立体交差のための絶縁膜11 06, 11 07の寸法のみにより決定できるため、短くすることができる。
- [0085] トラップ113 Q 114 0にはアース配線が不要であるため、2素子間のアース配線はフがレタ111 Q 112 0のアースに対して1本のみでよい。2素子間の配線1155, 115 6;1157, 1158が1層 日のみとなって線路の電気抵抗率が増大しても、2素子間の距離が短くなり、帯域内挿入損失の劣化を防ぐことができる。
- [0086] 次に、実施例3~7について、図12~図21、図23を参照しながら説明する。なお、図中、同じ構成部分には同じ符号を用いている。
- [0087] (実施例3) 図12 ~図19、図22を参照しながら、実施例3の弾注表面波フがレタ について説明する。実施例3の弾性表面波フィルタは、平衡 不平衡変換機能を有する。ここでは、不平衡信号端子のインピーダンスが50°、平衡信号端子のインピー

ダンスが 1 00^{cc} である、EGSM (Extended Global System for Mobile comm unications) 受信用フィルタを例に説明する。

- [0088] まず、図12及び図13を参照しながら、実施例3の構成について説明する。
- [0089] 実施例3の弾性表面波フィルタは、圧電基板100上に2つの縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子(以下、「フィルタ素子」という。)101,102を形成し、それらをカスケート接続したものである。圧電基板100には4075 YcutX伝搬LiTaO3基板を用い、フィルタ素子101,102はA1電極により形成されている。
- [009 0] 図12 に基本構成を模式的に示すように、一方のフィルタ素子1 01 は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置された3 つのIDT1 03, 1 04, 1 05 と2 つのリフレクタ1 06, 1 07 とを有する。中央のIDT1 04 を挟み込むように他のIDT1 03, 1 05 が形成され、その両側にリフレクタ1 06, 1 07 が形成されている。中央のIDT1 04 の一端は信号ライン122 によって不平衡信号端子117 に接続されている。
- [0091] 同様に、他方のフィルタ素子1 02も、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置された3つのIDT1 08, 1 09, 11 0と2つのリフレクタ111, 112とを有する。中央のIDT1 09を挟み込むように他のIDT1 08, 11 0が形成され、その両側にリフレクタ111, 112が形成されている。中央のIDT1 09の両端は、それぞれ信号ライン123, 124によって平衡信号端子118, 119に接続されている。
- [0092] 2つのフィルタ素子1 01, 1 02 は、カスケード接続されている。すなわち、一方のフィルタ素子1 01のIDT1 03, 1 05の一端と、他方のフがレタ素子1 02のIDT1 08, 11 0の一端とが、それぞれ、信号ライン12 0, 121により接続されている。一方のフィルタ素子1 01のIDT1 03, 1 05の他端と,他方のフがレタ素子1 02のIDT1 08, 11 0の他端は、それぞれアースに接地している。なお、これら他端は、アースに接地する代わりに、一端と同様に互いに接続しても、動作上問題はない。
- [0093] 各IDT1 03, 1 04, 1 05, 1 08, 1 09, 11 0の向きは、IDT1 03, 1 08 間を接続する信号ライン12 0を伝送する電気信号の位相と、IDT1 05, 11 0間を接続する信号ライン121を伝送する電気信号の位相が約18 0度異なるように調整されている。これによって、弾性表面波フィルタとして良好な振幅平衡度、位相平衡度を得ることができる。
- [0094] 図12において符号113 ~116で示した箇所(以下、狭ピッチ電極指部」といづ。)、

すなわち、一方のフィルタ素子1 01 においてIDTI 03, 1 04 間及びIDT1 04, 1 05 間、他方のフィルタ素子1 02 においてIDT1 08, 1 09 間及びIDT1 09, 11 0間において、隣接する数本の電極指のピッチ(電極指の幅及び電極指間の間隔)を、IDT1 03, 1 04, 1 05, 1 08, 1 09, 11 0の他の部分よりも小さくしている。なお、図12 においては、簡潔のために電極指は実際の本数よりも少なく図示している。このよっな狭ピッチ電極指部113 ~116を設けることにより、IDTが隣り合う箇所の不連続性を極力小さくし、かつIDT1 03, 1 04, 1 05, 1 08, 1 09, 11 0同士の間隔を調整することで、広帯域なバンドパスフィルタを得ることができる。

- [0095] 図13は、圧電基板100上の実際のレイアウトを示す。図13において、間隔が狭い 斜線部分は、1回目のフォトリソ工程で形成した電極パターン(以下、1層日パターン」という。)である。間隔が広い斜線部分は、2回目のフォトリソ工程で形成した電極パターン(以下、2層日パターン」という。)である。斜線のない部分250,251,252は、2層日パターンを形成する前に、誘電率の低い樹脂等で形成した絶縁膜のパターン(以下、絶縁膜パターン」という。)である。図13では、簡単のため、1層日パターンと2層日パターンが接するよっに図示しているが、実際には、接するよっに図示した部分の近傍において、1層日パターンと2層日パターンの少なくとも一方を図示よりも大き<形成し、1層日パターンと2層日パターンとを重ね合せて接続するよっになっている。
- [0096] 不平衡端子117は、図13において圧電基板100の上部中央に配置されている。 平衡信号端子118,119は、図13において圧電基板100の下部の左右に配置されている。アース端子201,202は、図13において圧電基板100の上部の左右に配置されている。つまり、平衡信号端子118,119は、圧電基板100の仮想中心軸Xに対して対称に配置されている。
- [0097] 一方のフィルタ素子1 OIの中央のIDT1 O4の一端は不平衡端子117に接続され、他端はアース端子2 O2に接続されている。一方のフィルタ素子1 OLの両側のIDT1 O 3 ,1 O5の一端はアース端子2 OL, 2 O2に接続され、他端は他方のフィルタ素子1 O2のIDT1 O8, 11 Oの一端に、信号ライン12 O、121によって接続されている。中央のIDT1 O4の他端とアース端子2 O2とを接続する接続ラインは、符号2 O3で示す部分に

おいて、IDT1 05, 11 0間を接続する信号ライン121の上に形成された絶縁膜251を介して、信号ライン2 01と立体交差している。

- [0098] 他方のフィルタ素子1 02のIDT1 08の他端は、リフレクタ111,1 06を介して、アース端子2 01に接続されている。すなわち、IDT1 08の他端とリフレクタ111とが接続ライン13 0により接続され、リフレクタ1 06,11 0間が接続ライン131により接続され、リフレクタ1 06とアース端子2 01とが接続されている。IDT11 0の他端は、アース端子2 02に接続されている。中央のIDT1 09の一端は、信号ライン123により一方の平衡信号端子118に接続されている。信号ライン123は、その大部分が絶縁膜25 0上に形成されている。信号ライン123は、符号2 04で示す部分において、リフレクタ1 06,11 1間を接続する接続ライン131と絶縁膜25 0を介して立体交差するとともに、符号2 05で示す部分において、IDT1 03,1 08間を接続する信号ライン12 0と絶縁膜25 0を介して立体交差するとともに、符号2 05で示す部分において、IDT1 09の他端は、信号ライン124により他方の平衡信号端子119に接続されている。信号ライン124と基板1 00との間には、絶縁膜252 が形成され、平衡信号端子118,119間の対称性を保つよっになっている。
- [0099] 次に、基板100上の各パターンを形成する方法について説明する。
- [0100] まず、基板100に、ドライエッチング法又はリフトオフ法を用いて、1層日のAI膜パターンを形成する。1層日のAI膜パターンは、IDT103,104,105;108,109,110、リフレクタ106,107;111,112、信号ライン120,121、接続ライン130,131を含む。1層日のAI膜厚はIDT103,104,105;108,109,110ともに同じになる。
- [0101] 次に、感光性樹脂を塗布して、フォトリソグラフィー法を用いて、絶縁膜25 Q 251, 252 を形成する。感光性樹脂には、例えばポリイミド(比誘電率:約2)を用いる。この場合、比誘電率が、LiTaO3 基板100の比誘電率約50に比べて十分小さいので、平衡信号端子118, 119に接続される信号ライン123, 124を絶縁膜25 Q 251の上に形成すると、平衡信号端子に接続される信号ラインを基板上に直接形成する場合と比べ、浮遊容量を低減できる。
- [0102] 次に、2層 日パターンに対応して開口したレジストマスクを形成し、リフトオフ法を用 いて2層 日のA1膜パターンを形成する。
- [0103] なお、1層 日のA1と基板100との間、又は2層 日のA1と1層 日のA1との間に、接着

層としてTi、又はNiCrを形成してもよい。

- [0104] 図2 0に、実施例3の弾性表面波フィルタのパッケージ裏面の外部端子4 01 ~4 05 のレイアウトを示す。図において上部中央の外部端子4 01 が不平衡信号端子であり、図12、図13の端子117に接続される。右下及び左下のコーナー部の外部端子4 0 2 ,4 03 が平衡信号端子であり、それぞれ図12、図13 の端子118, 119 に接続されている。中間位置の外部端子4 04, 4 05 はアース端子である。
- [01 05] このパッケージには、図18及び図19に示すよっに、圧電基板100と同じサイズの圧電基板70,80上に弾性表面波素子71,72;81~84が形成された他の構成の平衡一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタの素子チップを収納することができる。図18は図10の構成に対応し、図19は図11の構成に対応する。図18及び図19の他の構成の平衡一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタは、実施例3の圧電基板100と同様に、不平衡端子73,87が図において圧電基板70,80の上部中央に配置され、平衡信号端子74,75;86,85が図において下部の左右に配置され、アース端子76,77;88,89が図において上部の左右に配置されている。このような端子レイアウトは、実施例3の弾性表面波フィルタと同じである。
- [0106] したがって、実施例3の弾性表面波フィルタは、図18、図19のような他の構成の平衡 不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタとパッケージを共用ですることができる。
- [01 07] なお、図18及び図19は、図13と同様に、1層 日パターン、2層 日パターン、絶縁膜パターンを図示している。図18において、IDT71b,72b 間及びIDT71c,72c 間の信号ラインと、IDT71nとアース端子76,77とを接続する接続ラインとは、絶縁膜78,79を介して立体交差している。図19において、IDT84n,82nと端子87とを接続する信号ラインと、IDT84b,82oと端子88,89との間を接続する接続ラインとは、絶縁膜90,91を介して立体交差し、IDT83n,81nと端子86,85とを接続する信号ラインと、IDT83b,81oと端子88,89とを接続する接続ラインとは、絶縁膜92,93を介して立体交差している。
- [0108] 次に、弾性表面波フィルタのフィルタ素子101,102の設計の一例を挙げる。狭ぴり チ電極指部113~116以外のピッチを小さくしていない電極指のピッチで決まる波

長を几くすると、次のようになる。

- ·交叉幅:48.1 n,
- ・フィルタ素子1 01の電極指の本数 (IDT1 03, 1 04, 1 05 の順): 28 (6) / (6) 24 (6) / (6) 28 (か) コ内は、狭ピッチ電極指の本数)
- ・フィルタ素子1 02の電極指の本数 (IDT1 08, 1 09, 11 0の順): 28 (6) / (3) 24 (3) / (6) 28 (カンコ内は、狭ピッチ電極指の本数)
- ・リフレクク本数:8 0本
- ·メクライゼーションレシオ: 0 70
- ·電極膜厚: 0 08 0元
- [0109] 図14は、上記設計例(実施例3)の周波数 コモンモード減衰量特性を示す。コモンモード減衰量とは、平衡信号端子間の平衡度を示す特性であり、この減衰量が大きい方が平衡信号端子間の平衡度が良いことを示している。
- [0110] 図14には、比較例として、特許文献2のようにパッケージ内に平衡信号端子の引き回しを設け、パッケージの裏面端子のレイアウトを図2 0と同じにした場合の周波数ーコモンモート減衰量特性も示している。この比較例の圧電基板上のレイアウトを図15に示す。フィルタ素子1 01, 1 02 は上記設計例(実施例3)と同じ仕様である。圧電基板3 00上のレイアウトを示す図15において、不平衡信号端子117'は上部中央、平衡信号端子118'は中央よりもやや右寄り、平衡信号端子119'は右下に、それぞれ配置されている。アース端子3 01は左上、アース端子3 02は右上、アース端子3 03は中央よりもやや左寄り、アース端子3 04は左下に、それぞれ配置されている。
- [0111] EGSM受信用フィルタの通過帯域は、925 ~96 QMHzである。図14 について、この周波数帯で最大のコモンモート減衰量を比較すると、比較例では約24. OdBであるのに対し、実施例では約27. 5dBであり、比較例より約3.5dBコモンモート減衰量が改善している。
- [0112] このような効果が得られた要因は、1つはパッケージ内で平衡信号端子に接続される引き回しを比較例のように非対称にしていないので、その分の寄生容量等の影響の差がなくなったこと、も刀つは圧電基板上でIDTと平衡信号端子を接続する信号ライン123、124を誘電率の低い樹脂でできた絶縁膜パターンの上に設けたので、

圧電基板上で信号ライン123, 124の長さが異なっても、各平衡信号端子に入る寄生容量の差が小刮一とであると考えられる。

- [0113] 以上のように、実施例3によれば、3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタの3つのIDTのうち中央に位置するIDTの端子をそれぞれ平衡信号端子に接続することで、平衡 不平衡変換機能を持たせた弾性表面波フィルタにおいて、従来の方法よりも平衡信号端子間の平衡度が良好なフィルタを得ることができ、更に別の構成の平衡 不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタとのパッケージの共用 パング 可能となる。
- [0114] 次に、他の実施例4~7について説明する。実施例4~7においても、実施例3と同様の効果が得られる。以下では、実施例3との相違点を中心に説明する。
- [0115] (実施例4) 実施例3 において、信号ライン123, 124はいずれも絶縁膜25 Q, 251上に形成したが、実施例4においては、図16に示すよっに、長い方の信号ライン123についてのみ、絶縁膜25 O上に設けている。
- [0116] (実施例5) 図17に示すように、IDT1 08とアース端子との接続方法が、実施例3と異なる。すなわち、IDT1 08とリフレクタ皿1との間、リフレクタ1 06, 111間、リフレクタ1 06とアース端子2 01との間を接続する接続ラインがない。代わりに、アース端子2 02と接続するため、1層 日のパターンによってIDT1 08に連続する接続ライン132を形成している。この接続ライン132は、IDT11 0とアース端子2 02とを接続する2層 日パターンの接続ラインに接続するようにする。接続ライン132の上には絶縁膜252 が形成され、中央のIDT1 09と平衡信号端子119とを接続する信号ライン124と立体交差する。
- [0117] (実施例6) 図21に示すよっに、フィルタ素子1 02に弾性表面波共振子素子(以下、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、) 15 0を直列接続する。この場合も、2 つの縦結合共振子型 弾性表面波フィルタ素子をカスケート接続した実施例3 ~5 と同様、通過帯域外の減衰量を大きくすることができる。
- [0118] 共振子素子15 Oは、弾性表面波の伝搬方向に沿って、IDT151の両側にリフレクタ 152, 153が配置されている。IDT151の一端は不平衡信号端子117に接続され、 他端は信号ライン12 O, 121'によりフィルタ素子1 O2 のIDT1 O8, 11 Oの一端と接続

される。

- [0119] 1層日のパターンは、フィルタ素子1 C2と、共振子素子15 Oと、信号ライン12 O, 12 1'と、IDT1 (8とリフレクタ皿1との間の接続ライン13 Oと、リフレクタ111から共振子素子15 O側に途中まで伸びた接続ライン131'とを含む。共振子素子15 O側に途中まで伸びた接続ライン131'は、2層日パターンの接続ラインにより、アース端子2 O1 に接続されている。フィルタ素子1 C2のIDT1 O9と平衡端子118とを接続する信号ライン123は、絶縁膜25 Oを介して、信号ライン12 d及び接続ライン131'と立体交差する。
- [0120] 共振子素子15 Oは、IDT151の一端をアース端子2 O1、または2 O2 に接続し、信号ライン12 O7, 121'によりフィルタ素子1 O2と接続された他端は不平衡信号端子117と接続して、フィルタ素子1 O2 に共振子素子1 O5を並列接続してもよい。
- [0121] また、共振子素子15 Oは、複数の共振子素子が直列または並列に接続されていて もよい。
- [0122] (実施例7) 図23に示すように、圧電基板500の上に1つのフィルタ素子502のみを配置する。この場合も実施例3~6と同様、従来の方法よりも平衡信号端子518,519間の平衡度の良好なフィルタを得ることができ、更に別の構成の平衡一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタとのパッケージの共用でが可能となる。
- [0123] フがレタ素子5 02は、3つのIDT5 08, 5 09, 51 0の両側に、リフレクタ511, 512を有する。両側のIDT5 08, 51 0のっち、一方のIDT5 08の一端は信号ライン52 0 に接続され、他方のIDT51 0の一端は信号ライン521'に接続される。信号ライン52 0,5 21'は、2層 日パターンの接続ラインにより不平衡信号端子517に接続される。
- [0124] 1層 日のパターンは、フィルタ素子5 Q2と、信号ライン52 Q, 521'と、IDT5 Q8の他端とリフレクタ511との間を接続する接続ライン53 Qとを含む。リフレクタ511から途中まで伸びた接続ライン531'は、2層 日パターンの接続ラインにより、アース端子6 Q1 に接続されている。IDT51 Qの他端は、2層 日パターンの接続ラインにより、アース端子6 Q2 に接続されている。フィルタ素子5 Q2 のIDT5 Q9の一端と一方の平衡端子518とを接続する信号ライン523 は、絶縁膜65 Qを介して、信号ライン52 Q及び接続ライン531'と立体交差する。フィルタ素子5 Q2のIDT5 Q9の他端と他方の平衡端子51

PCT/JP2005/012871

[0125] 以上に説明したよっに、実施例3~7の弾性表面波フィルタは、圧電基板上に形成される各端子(バンプ)のレイアウトを、他の構成の弾性表面波フィルタの素子チップにおける各端子(バンプ)のレイアウトと同じにすることができるので、他の構成の弾性

表面波フィルタとパッケージを共用化することができる。

25

WO 2006/009021

- [0126] また、平衡信号端子に接続される信号ラインを、圧電基板上に形成された絶縁膜パターンの上に形成することにより、素子チップにおける信号ラインの経路差をほとんどなくすことができるので、パッケージ内において経路差を設けることなく、平衡度を改善することができる。
- [0127] (まとめ) 実施例1 ~7 によれば、弾性表面波装置の特性を向上することができる。
- [0128] なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、種々変更を加えて実施可能である。
- [0129] 例えば、基板には、 LiT_{aO_3} 以外に、水品、 LiN_{bO_3} などの単結品基板を用いることができる。また、本発明は、ZnO,AlNなどの圧電薄膜を用いた弾性表面波装置にも適用することができる。
- [0130] 例えば、実施例3~7では4075 YcutX伝搬LiTaO3 基板を用いたが、効果が得られる原理から、本発明はこの基板に限らず、例えば64~72 YcutX伝搬LiNbO3 41° YoutX伝搬LiNbO3 などの基板でも、同様な効果が得られる。
- [0131] また、本発明は、平衡一不平衡変換機能を持たせた構成の弾性表面波フィルタに限らず、平衡一平衡変換機能を持たせた構成の弾性表面波フィルタにも適用可能である。

請求の範囲

[1] 基板と、

前記基板に配置され、少なくとも不平衡端子及び2つの平衡端子を含む、複数の端子と、

前記基板の前記不平衡端子と2つの前記平衡端子との間に配置された、少なくとも 1つの弾性表面波素子とを備え、

同一の前記弾性表面波素子にそれぞれ接続された異なる信号線が、絶縁膜を介して交差することを特徴とする、弾性表面波装置。

- [2] 前記絶縁膜がポリイミドであることを特徴とする、請求項1に記載の弾性表面波装置
- [3] 少なくとも2つの前記弾性表面波素子を備え、

1つの前記弾性表面波素子(以下、第1の素子」れづ。)は、前記不平衡端子と、接地するための接地端子(以下、ケースパッドれづ。)とに、それぞれ異なる前記信号線によって接続され、

他の1つの前記弾性表面波素子(以下、第2の素子」れづ。)と前記第1の素子との間をそれぞれ接続する少なくとも2つの前記信号線(以下、信号配線」れづ。)が形成され、

少なくとも1つの前記信号配線と、前記アースパッドと前記第1の素子との間を接続する前記信号線(以下、アース配線」れづ。)とが、前記絶縁膜を介して交差し、

前記アースパッドが、前記第1の素子、前記第2の素子、及び前記信号配線とによって囲まれる領域の外側に配置されたことを特徴とする、請求項1又は2に弾性表面波装置。

[4] 前記第1の素子は、弾性表面波の伝搬方向を揃えて配置された3つのIDTを含み、その中央の前記IDTに前記不平衡端子と前記アースパッドとが接続され、

前記第2の素子は、弾性表面波の伝搬方向を揃えて配置された3つのIDTを含み、その中央の前記IDTに2つの前記平衡端子が接続され、

前記第1の素子の両側の前記IDTと前記第2の素子の両側の前記IDTとが前記信号配線によってそれぞれ接続されていることを特徴とする、請求項3に記載の弾性表

面波装置。

[5] 2組の前記第1の素子、前記信号配線及び前記第2の素子が前記基板に形成され

各組の前記第1の素子は、それぞれ、弾性表面波の伝搬方向を揃えて配置された3つのIDTを含み、その中央の前記IDTに前記不平衡端子と前記アースパッドとが接続され、

各組の前記第2の素子は、それぞれ、異なる1つの前記平衡端子に接続された1つのIDTを含み、

各組の2つの前記信号配線は、各組の前記第1の素子の両側の前記IDTと各組の前記第2の素子の前記IDTとをそれぞれ接続し、

2組の前記第1の素子は逆位相であることを特徴とする、請求項3に記載の弾性表面波装置。

- [6] 前記アース配線は、前記絶縁膜及びその近傍の部分を除いて形成された1層目と、前記絶縁膜及びその近傍の部分を含めて形成された2層目とを有することを特徴とする、請求項3、4又は5に記載の弾性表面波装置。
- [7] 互いに接続された少なくとも2つの前記弾性表面波素子を備え、

1つの前記弾性表面波素子(以下、第1の弾性表面波素子」れづ。)は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置された3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子であり、3つの前記IDTのっち中央の前記IDTが2つの前記信号線(以下、第1及び第2の信号ライン」れづ。)を介して2つの前記平衡信号端子にそれぞれ接続され、

2つの前記平衡信号端子は、2つの前記弾性表面波素子が並ぶ方向と略平行な前記基板の中心軸の両側にそれぞれ配置され、

前記第1及び第2の信号ラインの少なくとも一方が、前記基板上に形成された前記 絶縁膜上に配置されたことを特徴とする、請求項1又は2に記載の弾性表面波装置。

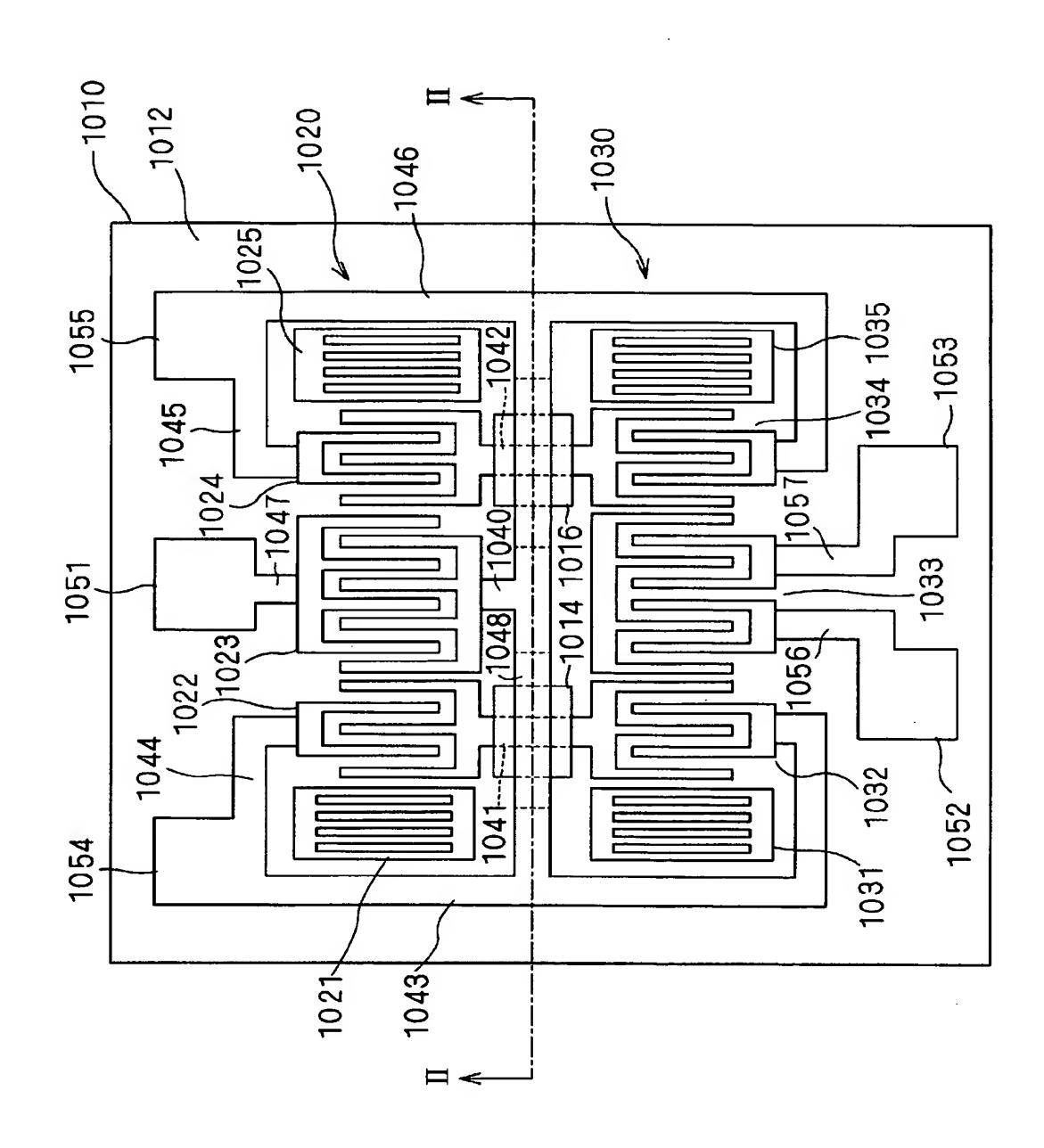
- [8] 2つの前記平衡信号端子は、前記基板の前記中心軸に対して略対称に配置されたことを特徴とする、請求項7に記載の弾性表面波装置。
- [9] 前記第2の弾性表面波素子は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置され、前記第

1の弾性表面波素子にカスケート接続された3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子であることを特徴とする、請求項7又は8に記載の弾性表面波装置。

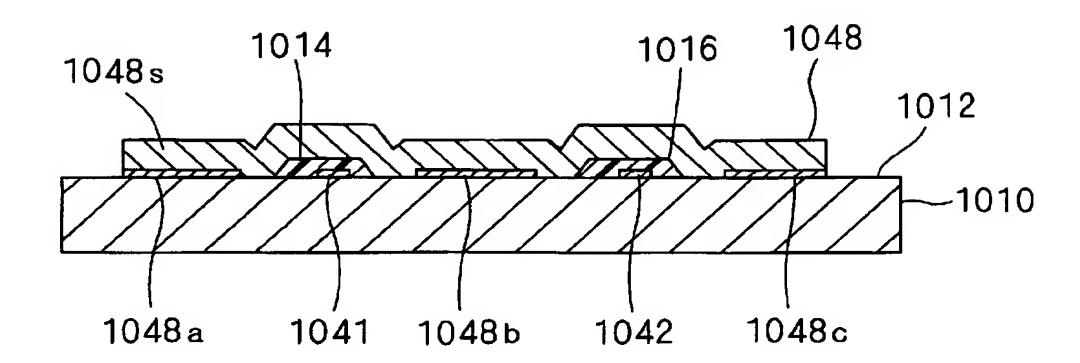
- [10] 前記第2の弾性表面波素子は、1つまたは複数接続された弾性表面波共振子素子であることを特徴とする、請求項7又は8に記載の弾性表面波装置。
- [11] 前記弾性表面波素子は、弾性表面波の伝搬方向に沿って配置された3つのIDTを有する縦結合共振子型弾性表面波フィルタ素子であり、3つの前記IDTのっち中央の前記IDTが前記信号線(以下、第1及び第2の信号ライン」れづ。)を介して2つの前記平衡端子にそれぞれ接続され、

2つの前記平衡信号端子は、弾性表面波の伝搬方向に略直角方向の前記基板の中心軸の両側にそれぞれ配置され、

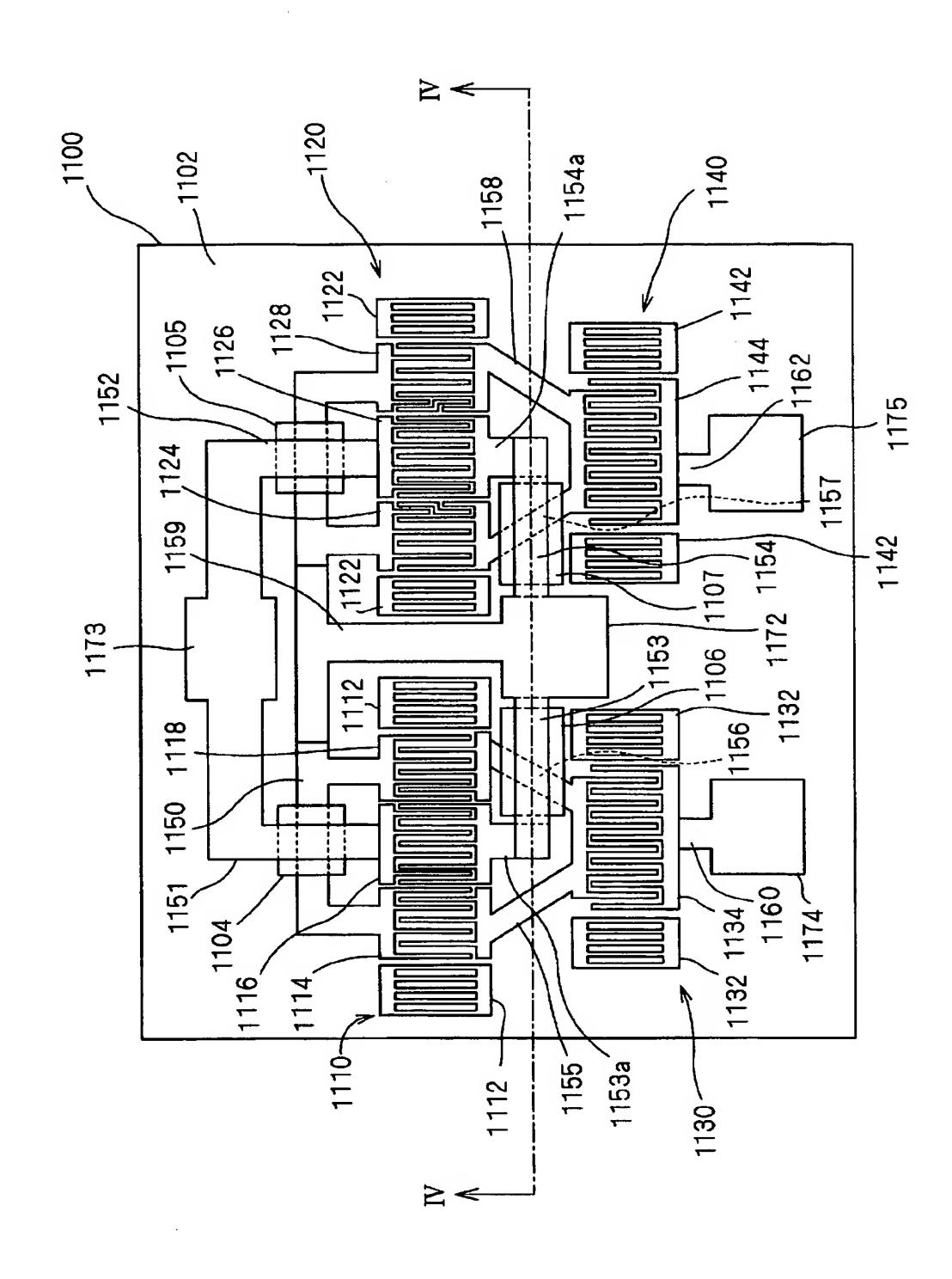
前記第1及び第2の信号ラインの少なくとも一方が、前記基板上に形成された前記 絶縁膜上に配置されたことを特徴とする、請求項1又は2に記載の弾性表面波装置。 [図1]



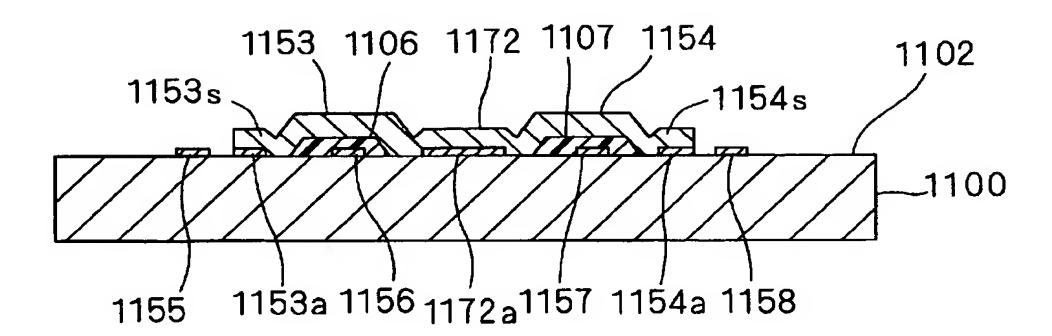
[図2]



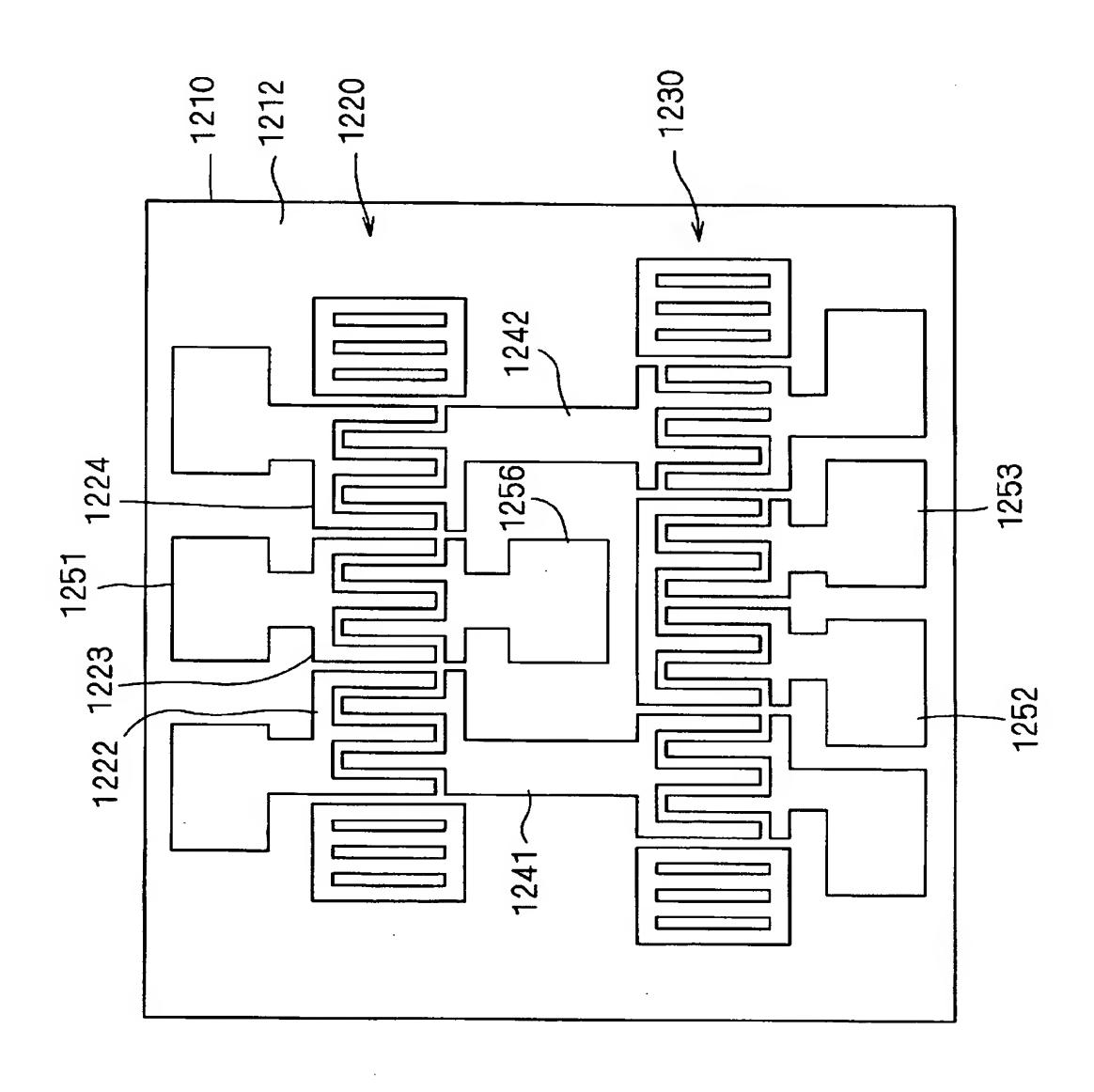
[図3]



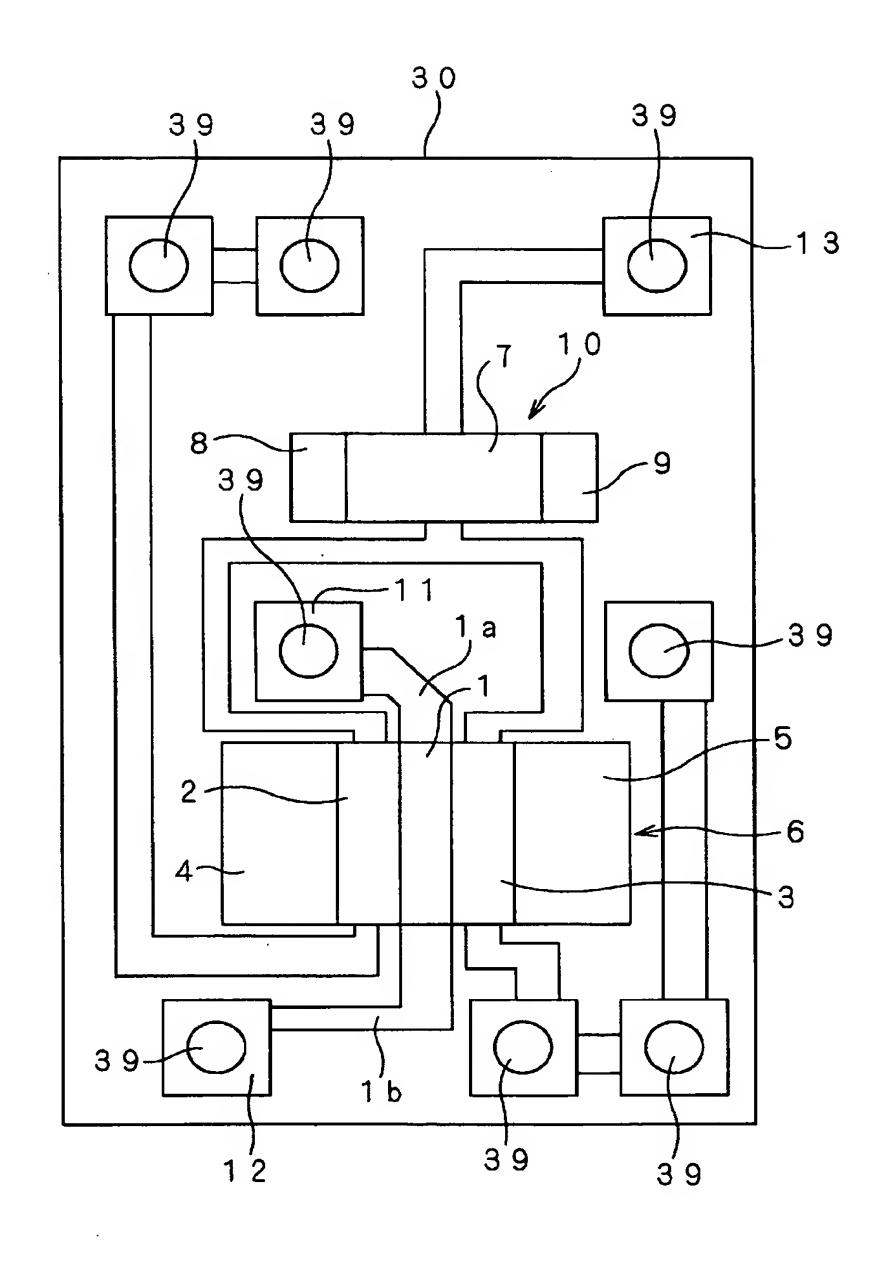
[図4]



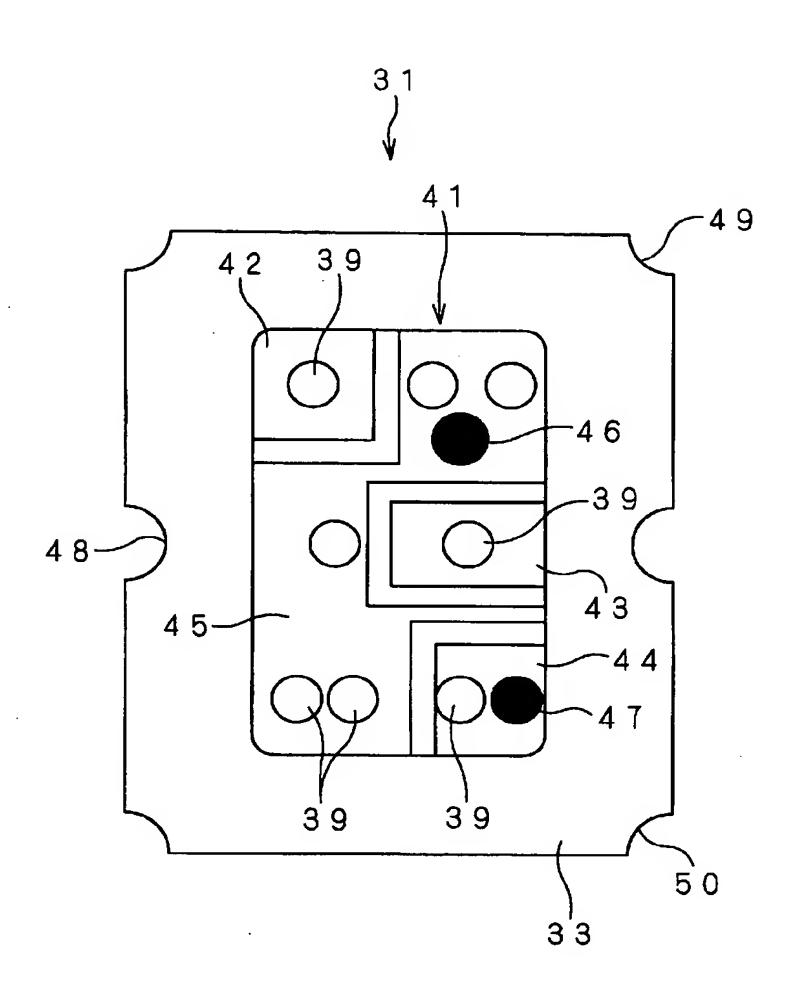
[図5]



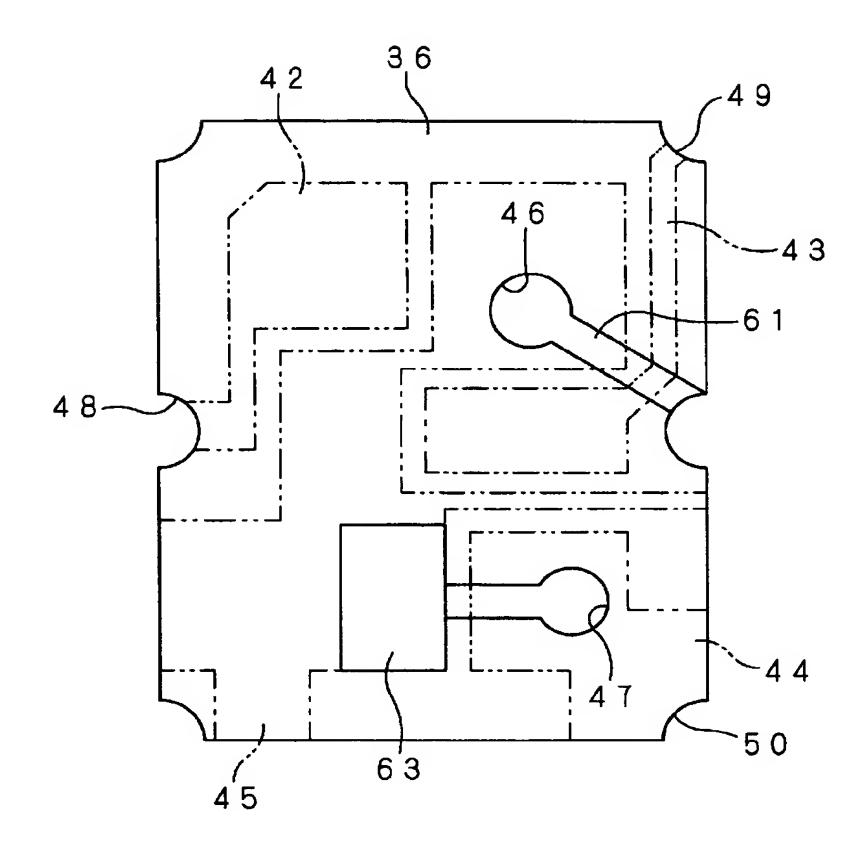
[図6]



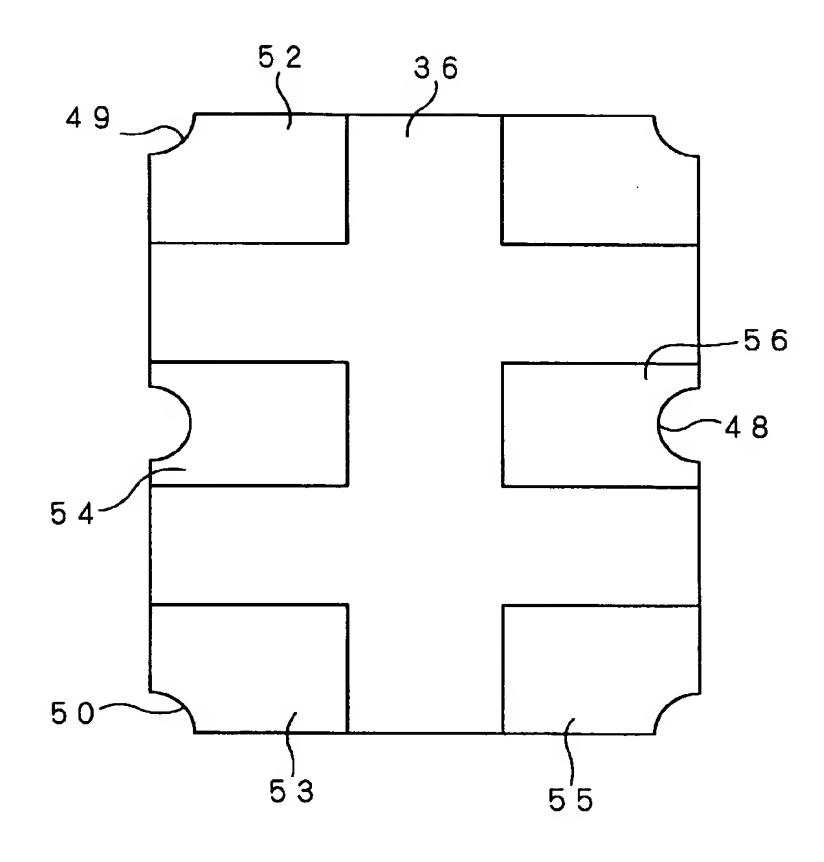
[図7]



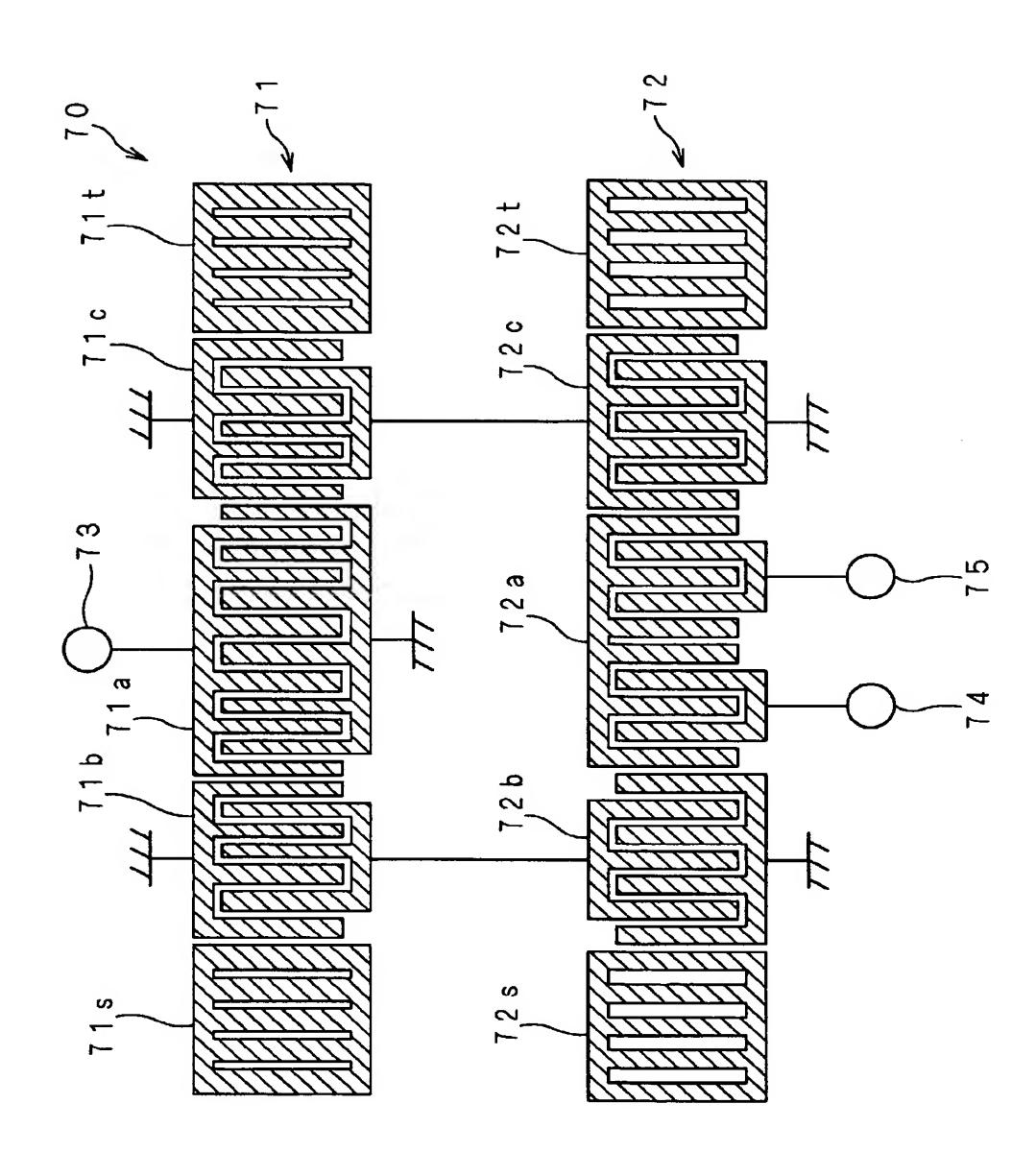
[图8]



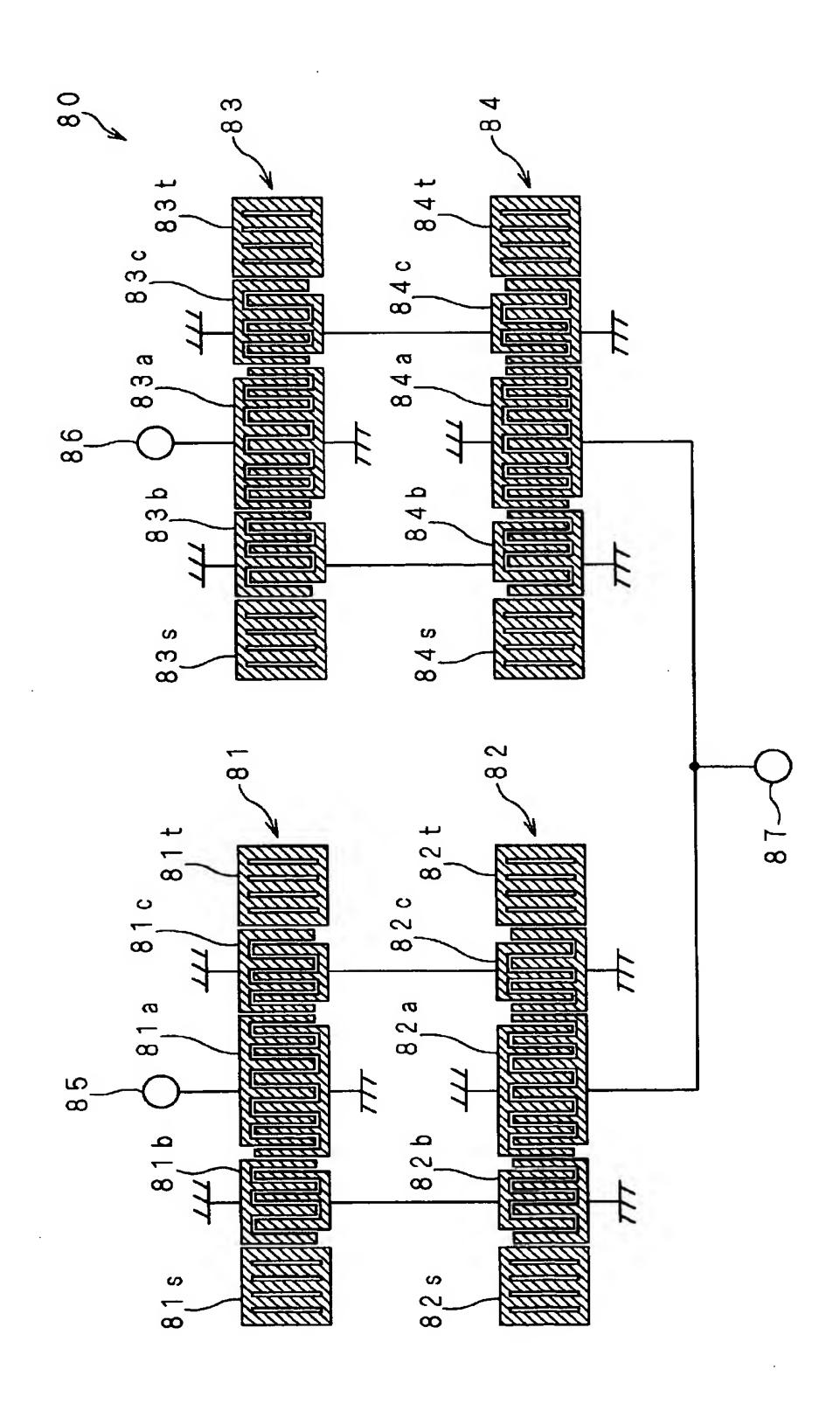
[図9]



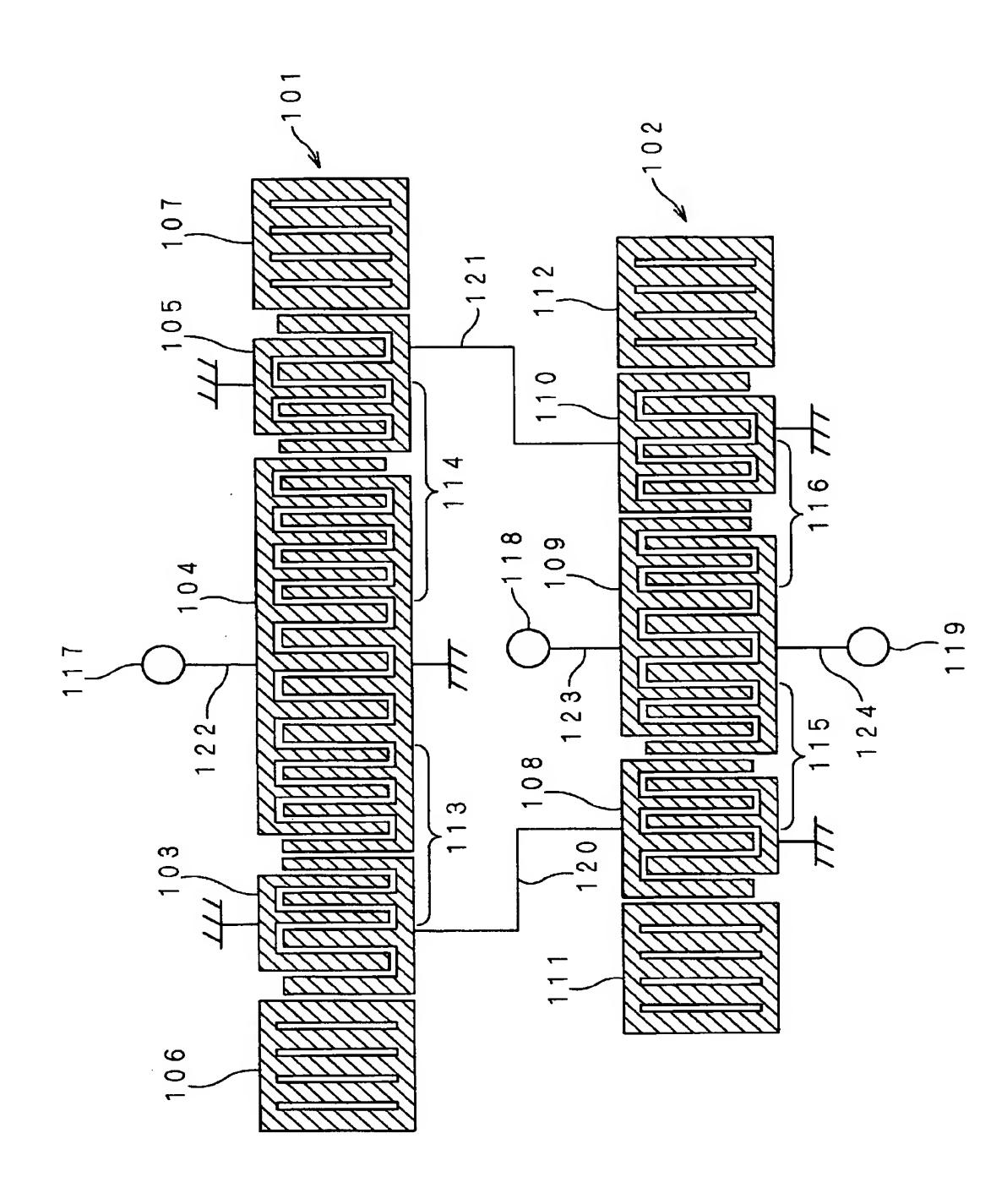
[図10]



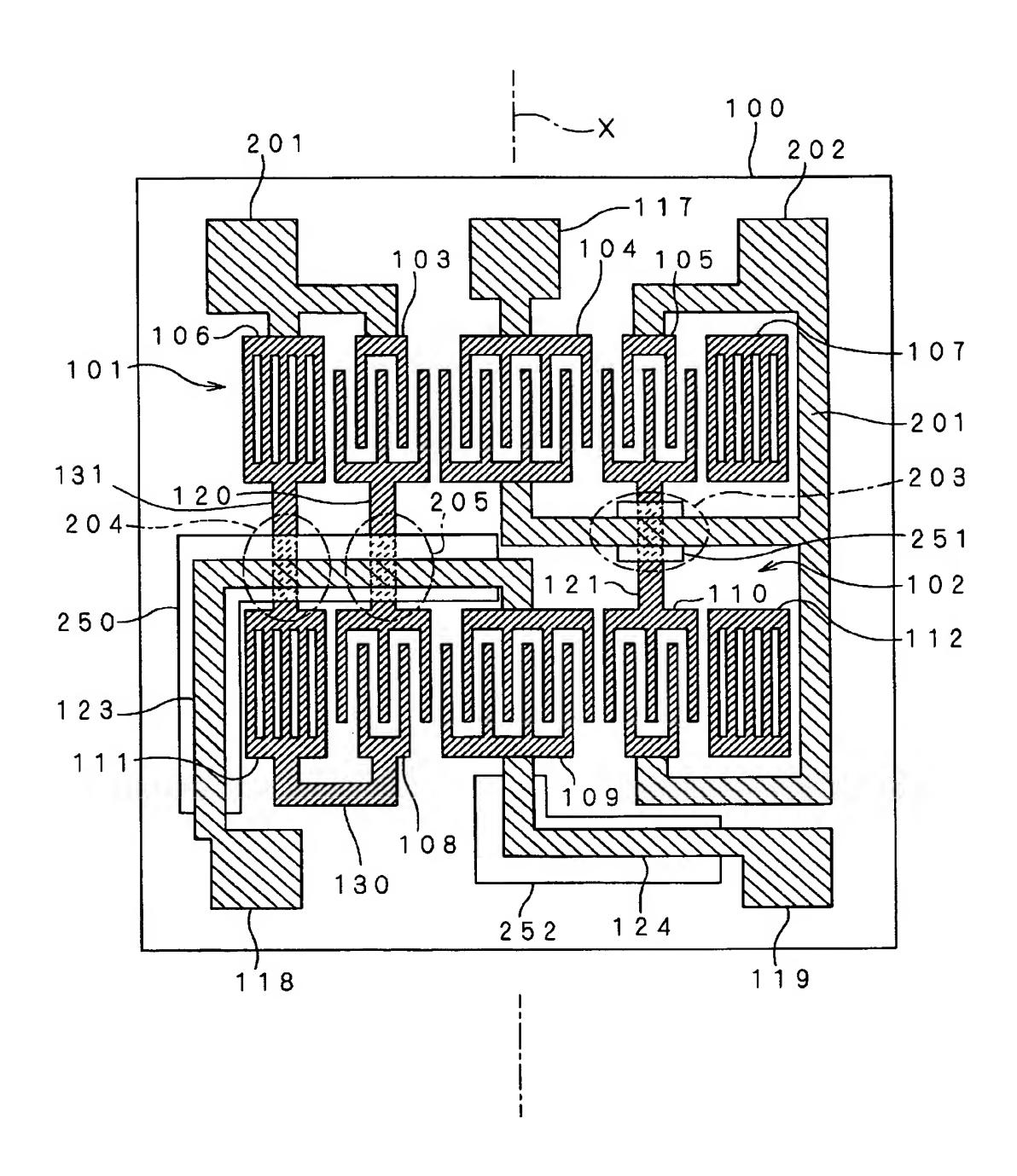
[図11]



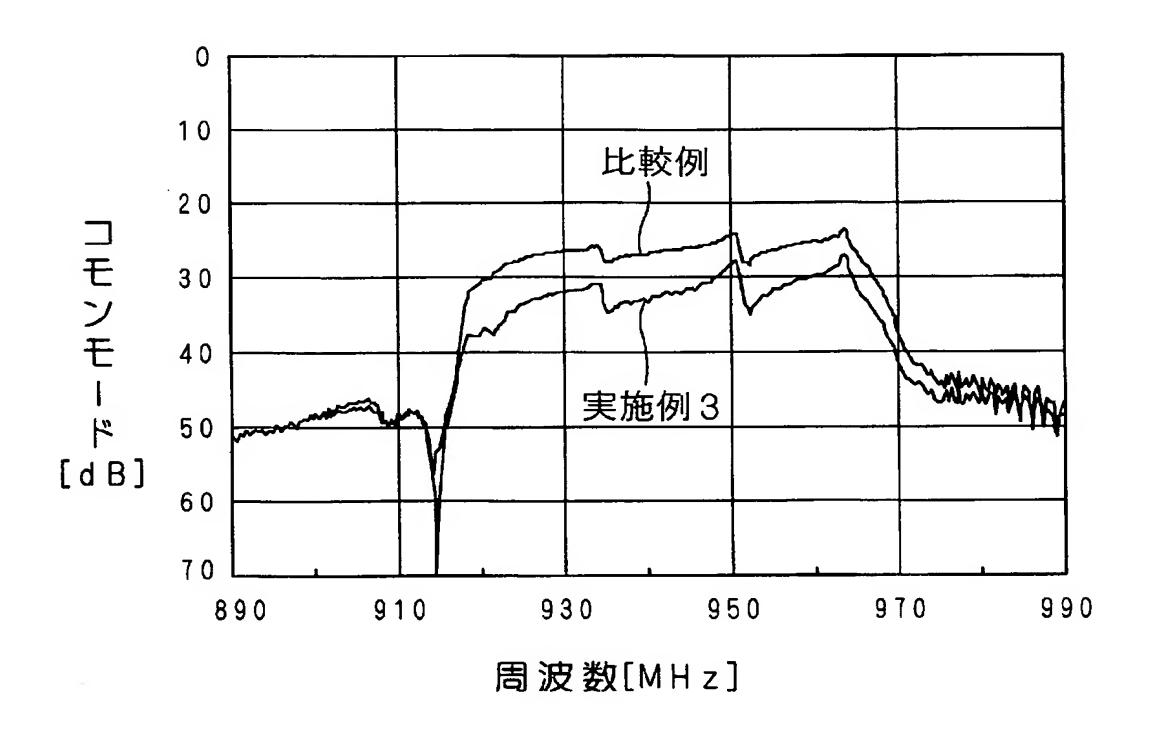
[図12]



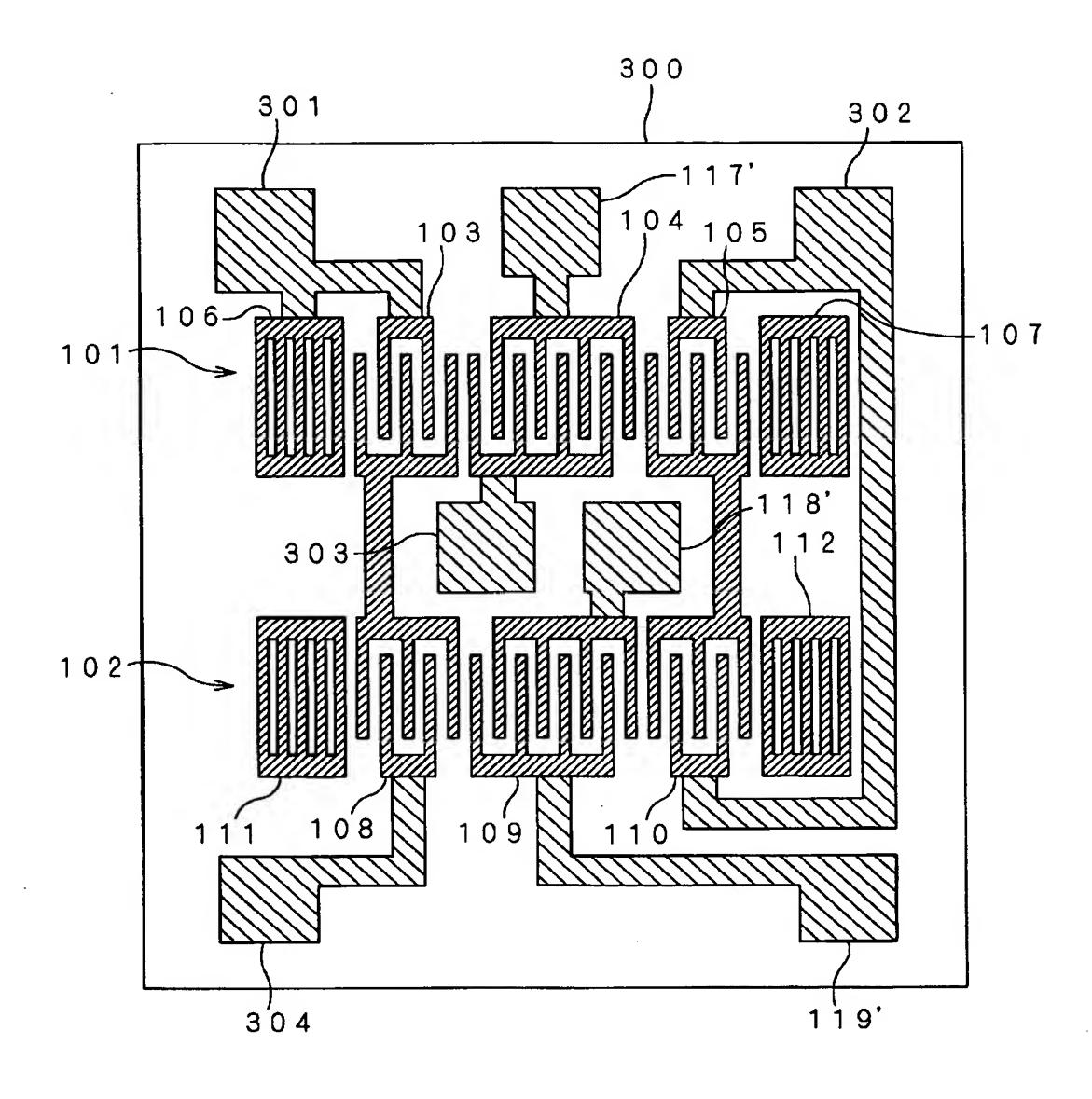
[図13]



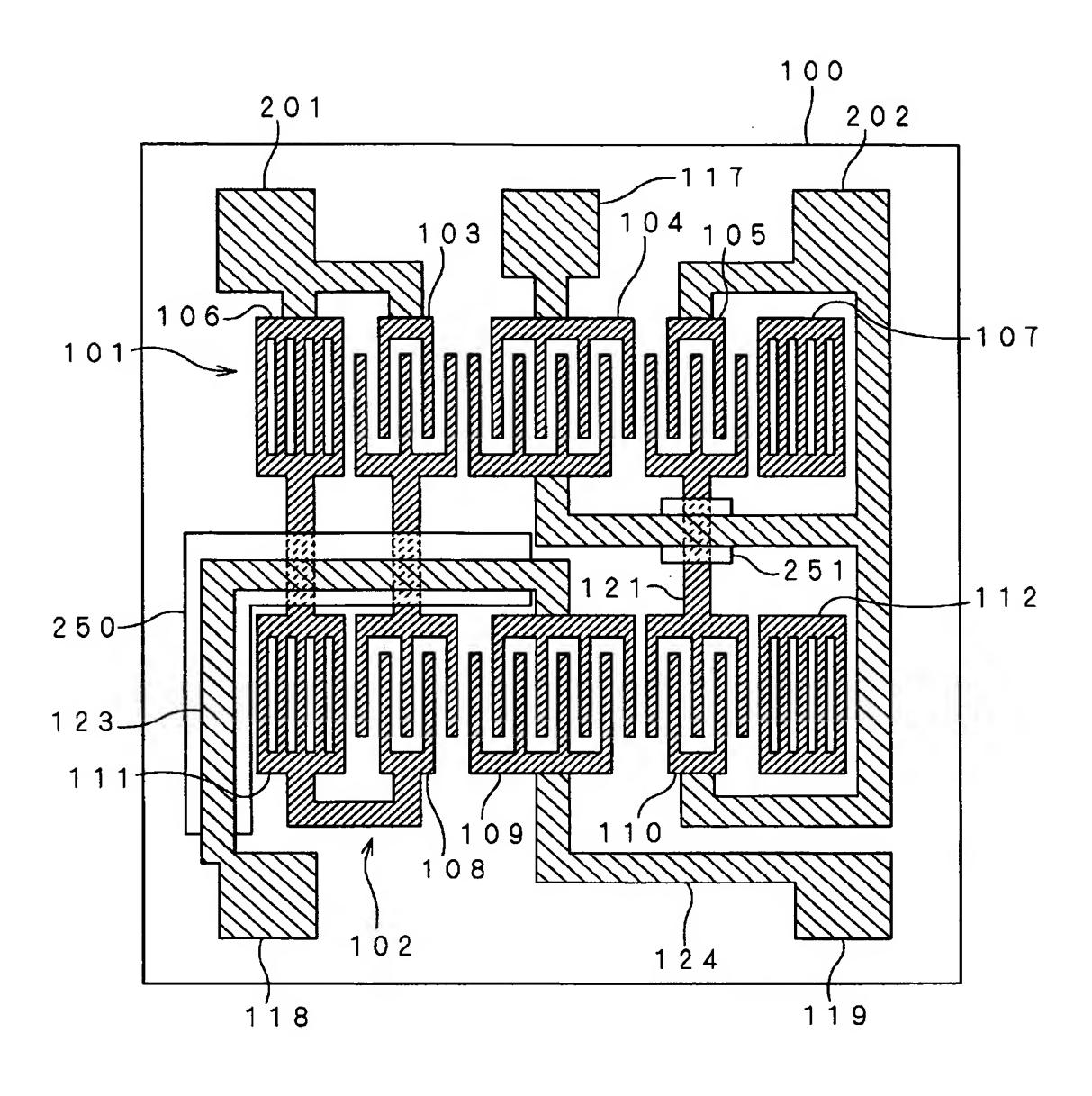
[図14]



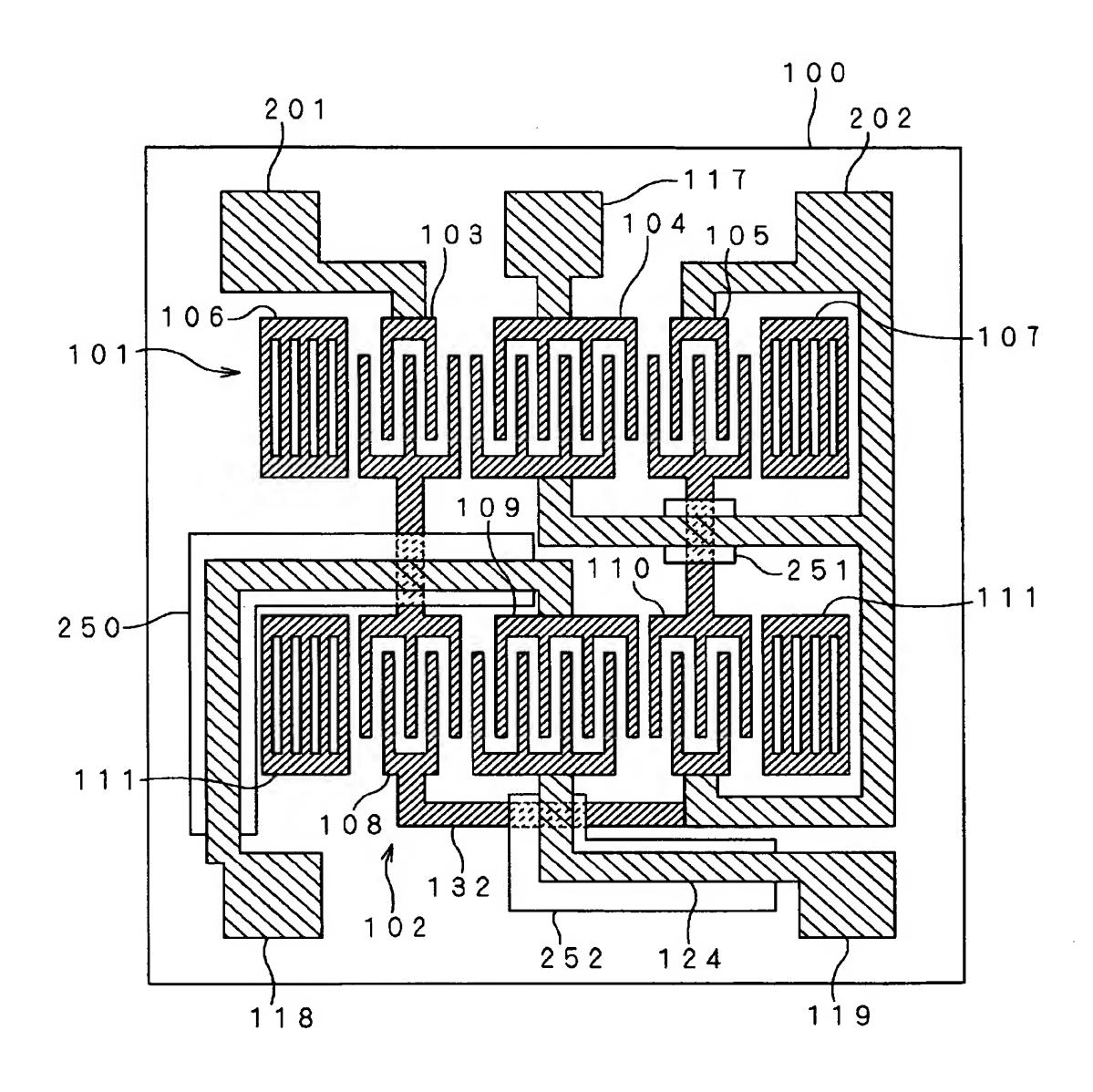
[図15]



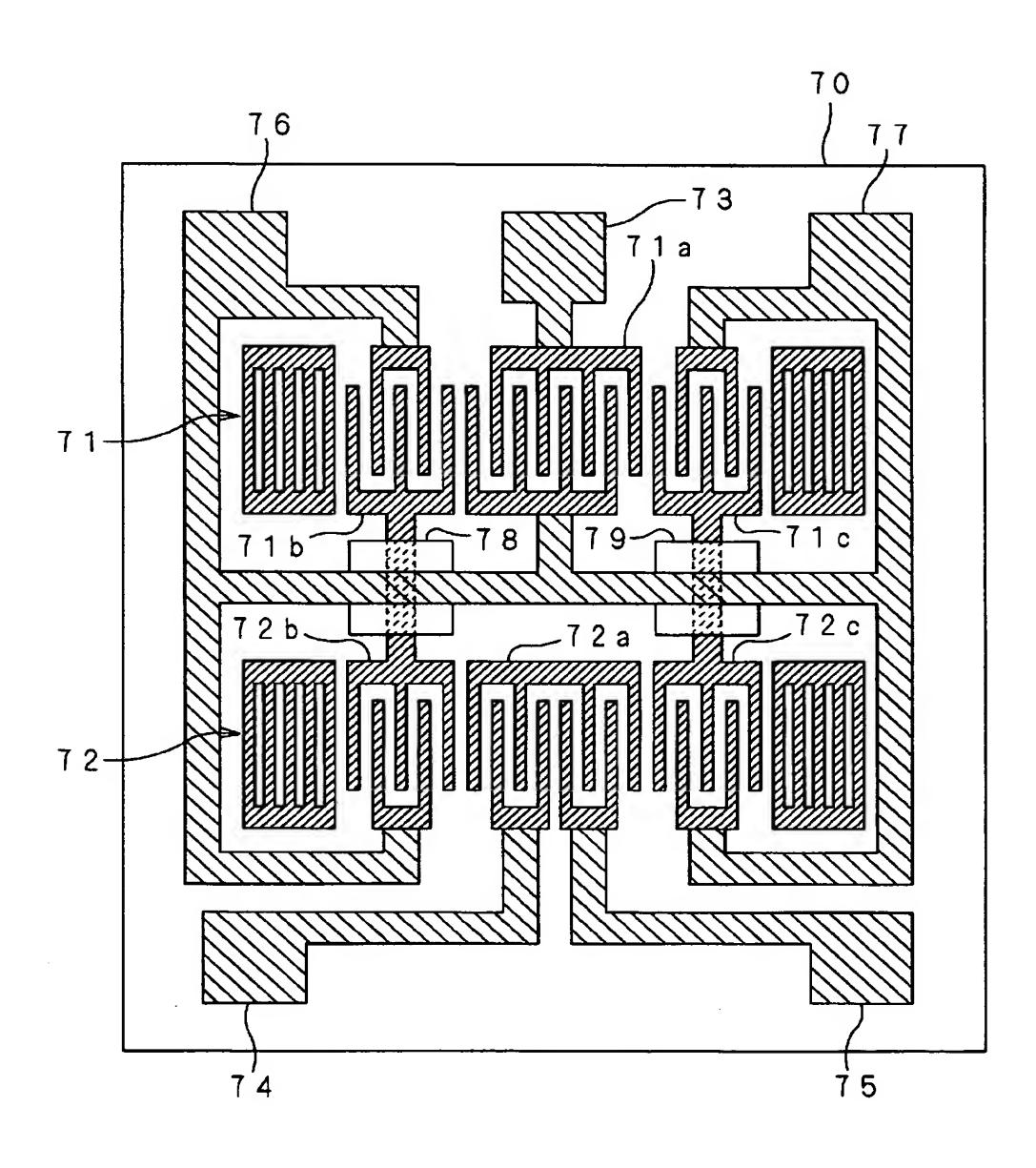
[図16]



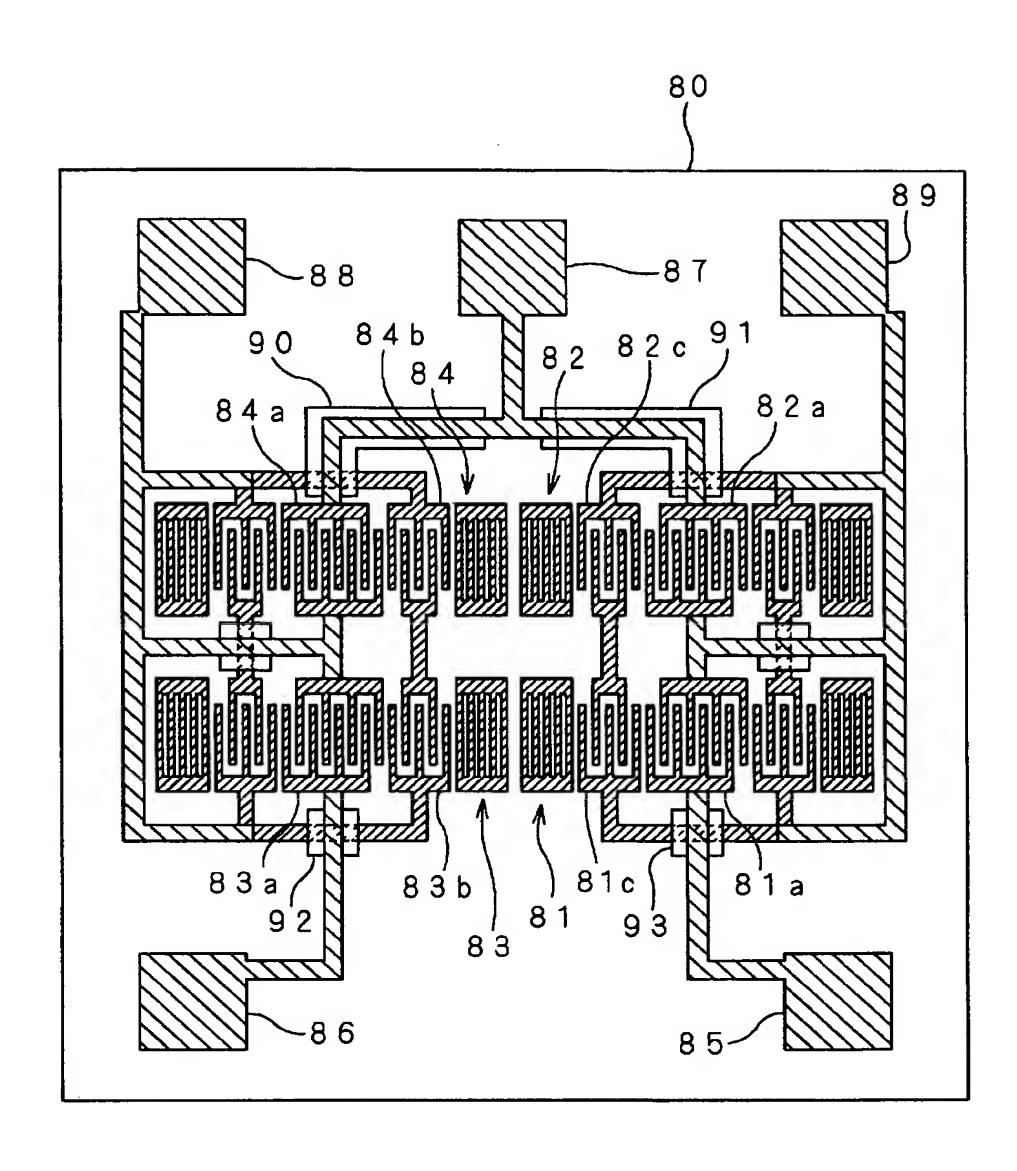
[図17]



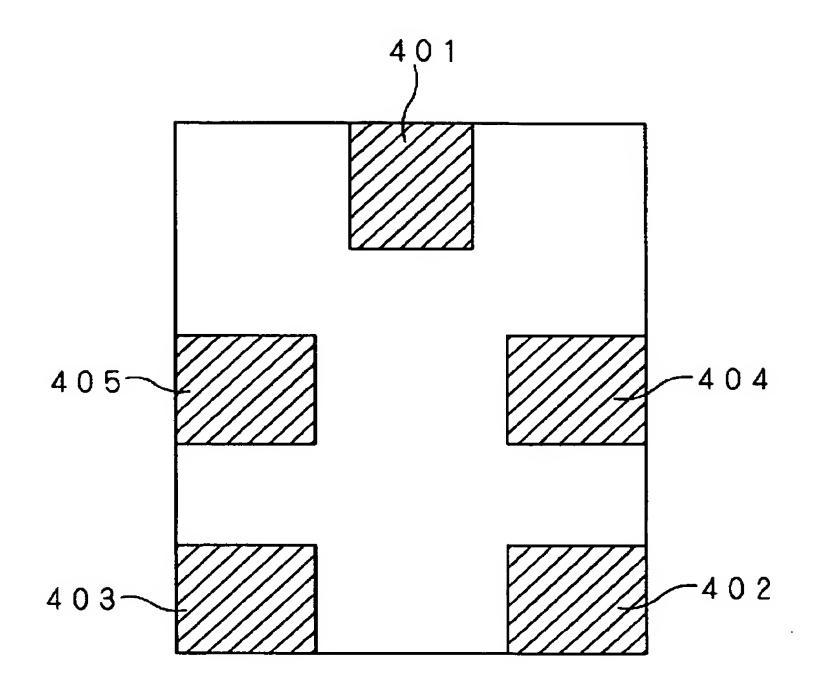
[図18]



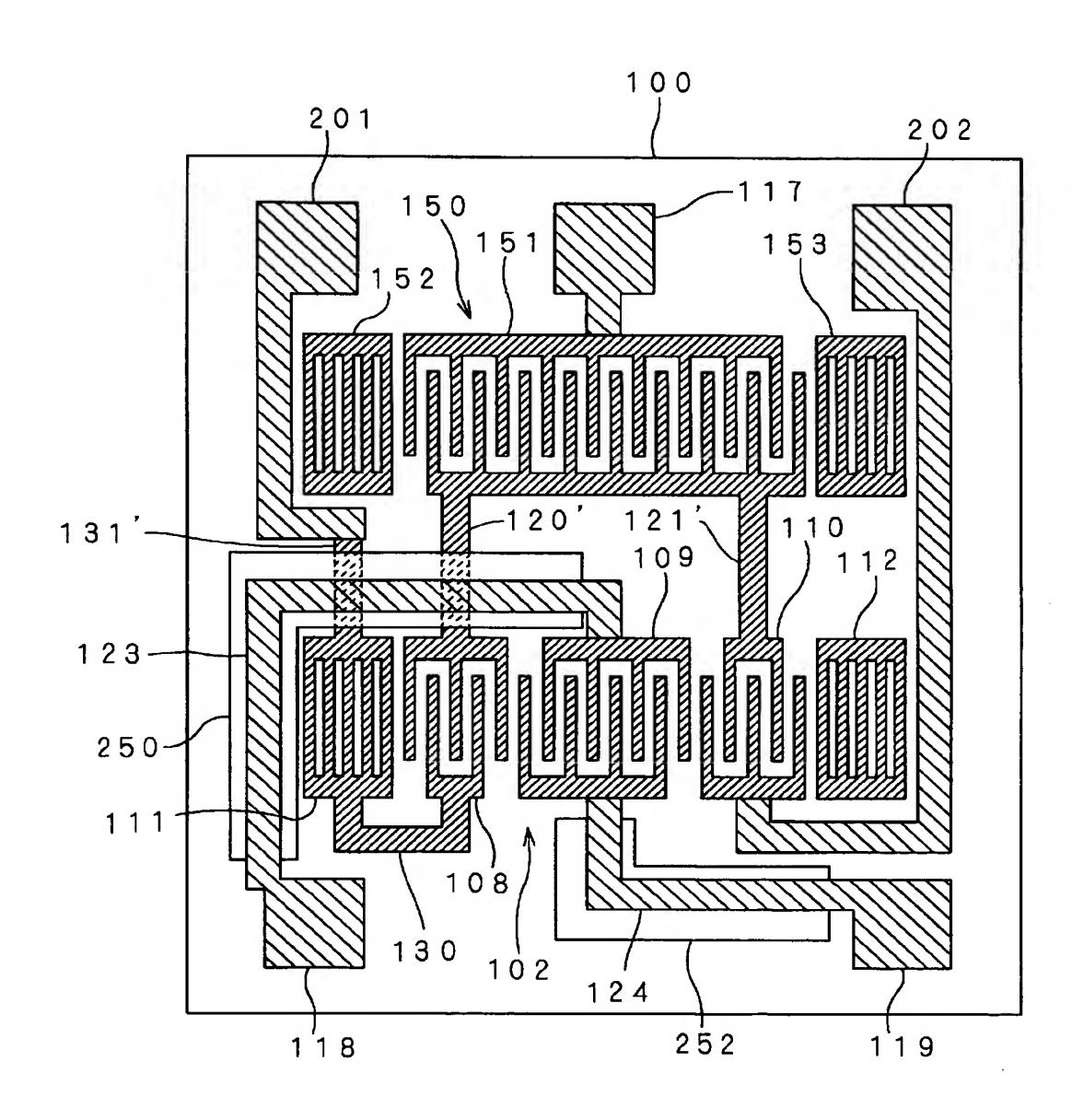
[図19]



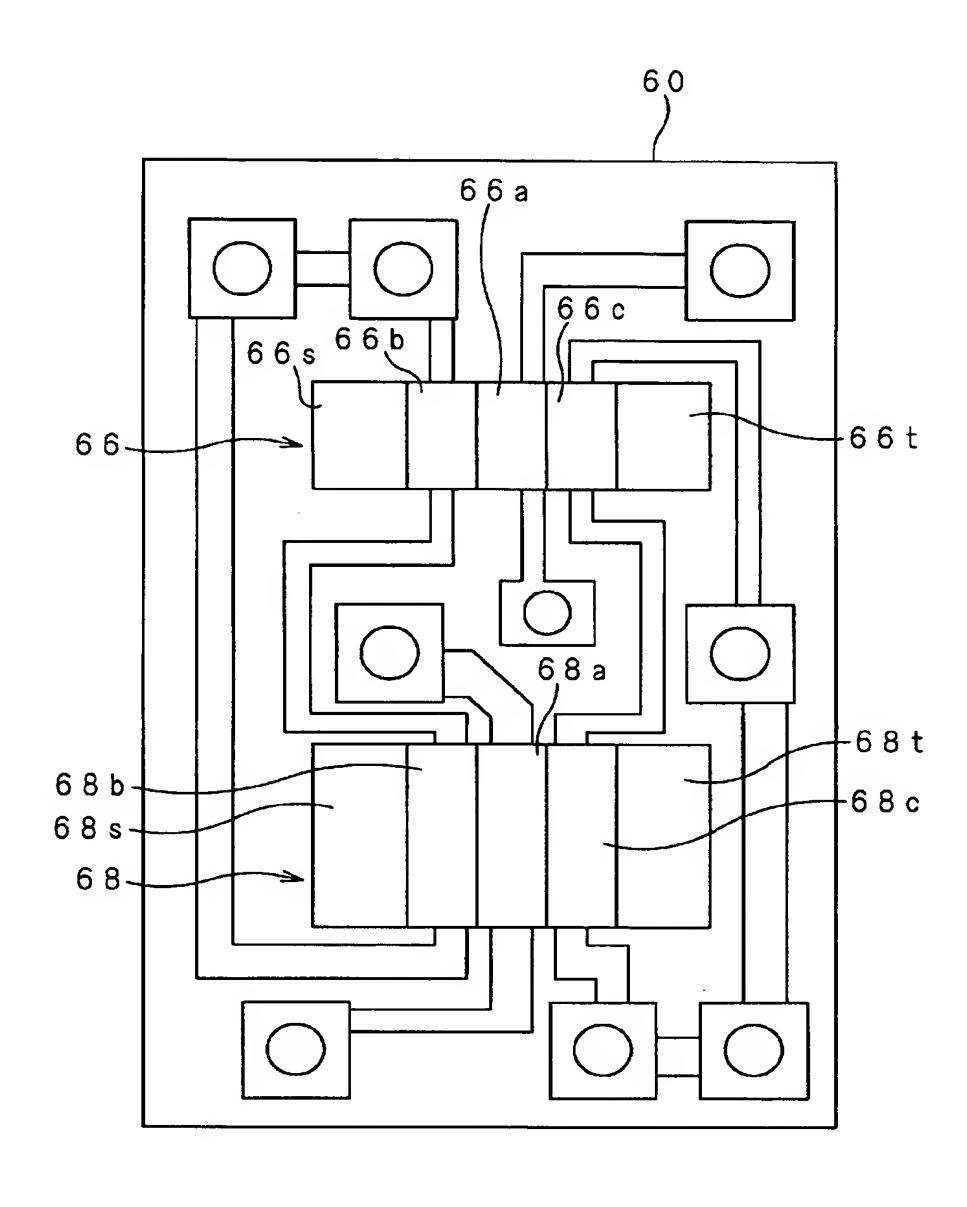
[図20]



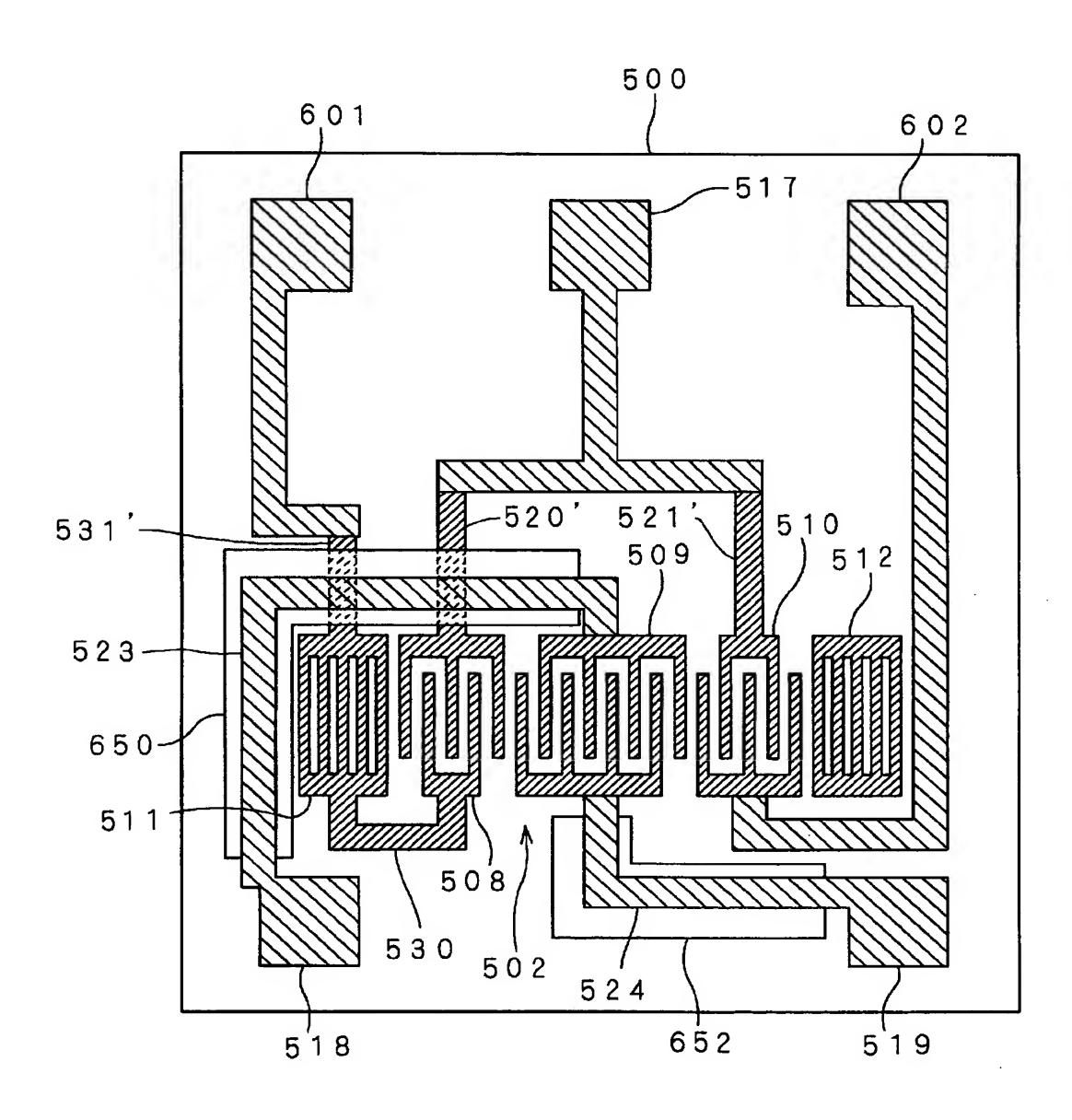
[図21]



[図22]



[図23]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tarnkmonal applic kmon No.
PCT/JP2005/012871

	CATION OF SUBJECT MATTER 1.45 (2006.01), H03H9/64 (2006.01)	1), H03H9/25 (2006.01)				
According & International P tent Classific tion (IPC) or & both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H03H3/08 (2006.01), H03H3/10 (2006.01), H03H9/145 (2006.01), H03H9/25 (2006.01), H03H9/42 (2006.01), H03H9/44 (2006.01), H03H9/64 (2006.01), H03H9/68 (2006.01), H03H9/72 (2006.01), H03H9/76 (2006.01)						
Jitsuyo Kokai Jit	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documentation are included 面 the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005 Elcc Honic d ta base consulted dur面g the 面 ternational search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT	ī				
Category	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X Y A	JP 2003-204243 A (Matsushita Industrial Co., Ltd.), 18 July, 2003 (18.07.03), Par. Nos. [0060] to [0089]; F & US 2003/0107454 Al & EP & CN 001418031 A	igs. 18 to 19 001315297 A2	1, 11 2 3-10			
A	JP 2003-297926 A (Fujitsu Qual Ltd.), 17 October, 2003 (17.10.03), Par . No . [0059]; Fig . 11 & US 2003/0183884 Al & US & JP 2004-088551 A & US	2005/0064657 A	2,11 3-10			
	cumen# are listed m the cont面uation of Box C.	See p tent family annex.				
 * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on pπoπty claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published pπor to the international filing date but later than the pπoπty date claimed 		 "T" later document published after the international filing date or pποπty date and not in conflict with the application but cited to understand the pπnciple or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family 				
Date of the actual completion of the international search 06 October, 2005 (06 . 10 . 05)		Date of mailing of the international search 25 October, 2005 (2	-			
Japanes	ng address of the ISA/ e Patent Office	Authorized officer				
_Facsimile No						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/012871

		D 1
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 10-256862 A (TDK Corp.), 25 September, 1998 (25.09.98), Par. Nos. [0015], [0022]; Figs. 1 to 2 (Family: none)	2,11 3-10
A	JP 2004-088551 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 18 March, 2004 (18.03.04), Figs. 1 to 4 & US 2004/0066115 Al	1-11
A	JP 2004-096244 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 25 March, 2004 (25.03.04), Figs. 1 to 6 & US 2004/0080385 Al & EP 001394941 A2 & CN 001496174 A	1-11
	JP 10-070435 A (Japan Radio Co., Ltd.), 10 March, 1998 (10.03.98), Par. Nos. [0040] to [0042]; Figs. 4, 6 (Family: none)	1-11

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

B. 調査を行った分野

査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本 国実用新案登録公報日本 国登録 実用新案公報

1996-2005年1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴ リー _本	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき肚、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	皿 2003-204243 A (松下電器産業株式会社)	1, 11
Y	2003.07.18, [0060] - [0089]、图 18-图 19	2
Α	& US 2003/0107454 Al	3-10
	& EP 001315297 A2	
	& CN 001418031 A	I

浮 C欄の続きにも文献が列挙されている。

バテント7ァミリーに関する別紙を参照。

ォ 引用文献のカテゴリー

IA J 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの

- TEJ国際出願日前の出願また肚特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- IL」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若 し<は他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- roj 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- IPJ 国際出願 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の目の役に公表された文献
- IT J 国際出願 日又は優先 日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- IX J 特に関連のある文献であって、当議文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- IY J 特に関連のある文献であって、当議文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- T&J 同一パテントファミリー文献

国際調査報告

c 続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリムォ	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2003-297926 A (富士通力ンタムデバイス株式会社)	2, 11
A	2003.10.17, [0059] 🗵 11	3-10
	& US 2003/0183884 Al	
	& US 2005/0064657 A	
,	& JP 2004-088551 A	
	& US 2004/0066115 Al	
Y	JP 10-256862 A (ティーディーケイ株式会社)	2, 11
A	1998.09.25, [0015]、[0022]、图 1-图 2	3-10
	(ファミリーなし)	
A	JP 2004-088551 A 株式会社村田製作所)	1-11
	2004.03.18, 图 1-图 4	
	& US 2004/0066115 Al	
A	型 2004-096244 A 株式会社村田製作所)	1-11
	2004.03.25, 图 1-图 6	
Ì	& US 2004/0080385 Al	
	& EP 001394941 A2	
	& CN 001496174 A	
A	JP 10-070435 A (日本無線株式会社)	1-11
	1998. 03. 10, [0040] -[0042] 、図 4、図 6	
	<i>(7 ァ</i> ミリニなし)	
		•
4- 24		